

جمــــهورية الـــــعراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامــــعة القــــادسية

كلية التربية– قسم الفيزياء

دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأغشية كبريتيد الكادميوم CdS النقية والمطعمة بالليثيوم والألمنيوم المحضرة بطريقة الحمام الكيميائي . رسالة تقدم بها

داخل عباس عبدزيد

إلى عمادة كلية التربية- جامعة القادسية وهي جزء من متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم الفيزياء

^{إشراف} **أ.م. د حسين علي نور**

2017 م

- 1439



إقرار المشرف

أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة ب (دراسة الخصانص التركيبية والبصرية والكهربانية لأغشية كبريتيد الكادميوم CdS النقية والمطعمة بالليثيوم والألمنيوم المحضرة بطريقة الحمام الكيمياني) المقدمة من قبل طالب الماجستير (داخل عباس عبدزيد) قد جرت تحت إشرافي في قسم الفيزياء - كلية التربية - جامعة القادسية، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الفيزياء .

التوقيع : الاسم : أ.م. د حسين علي نور التاريخ: ٢٠ / ٨ / ٢٠

مسقال سين أيصر



إقرار المقهم اللنهي

أشهد إني قد قومت الرسالة الموسومة بـ دراسة الخصانص التركيبية والبصرية والكهربانية لأغشية كبريتيد الكادميوم CdS النقية والمطعمة بالليثيوم والألمنيوم المحضرة بطريقة الحمام الكيمياني) لطالب الماجستير ((داخل عباس عبدزيد)) لغويا فوجدتها صالحة للمناقشة .

التوقيع فللح

الاسم: د. فرح مهدي صالح

الدرجة العلمية : أستاذ مساعد

العنوان : جامعة القادسية / كلية التربية / قسم اللغة العربية

التاريخ: ٢٤/ ٩ / ٢٧

إقرار الأنة إلىناقشة

نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة بأننا قد اطلعنا على الرسالة الموسومة بـ (دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأغشية كبريتيد الكادميوم CdS النقية والمطعمة بالليثيوم والألمنيوم المحضرة بطريقة الحمام الكيميائي) المقدمة من قبل طالب الماجستير (داخل عباس عبدزيد) وناقشناها في محتوياتها وفيما له علاقة بها، ونعتقد أنها جديرة بالقبول لنيل أسارة ماجستير في علوم الفيزياء بتقدير تن (امتياز).

> التوقيع : الاسم : د. فؤاد شاكر هاشم الدرجة العلمية : أستاذ العنوان : جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الصرفة رئيس لجنة المناقشة التاريخ : / /

> > التوقيع :

الاسم : د. عادل حبيب عطر أن الدرجة العلمية: أستاذ مساعد

عضو لجنة المناقشة

التاريخ: / /

العنوان : جامعة الكوفة / كلية العلوم

التوقيع: الاسم : د. سليم عزارة حسين الدرجة العلمية : استاذ مساعد العنوان : جامعة القادسية / كلية التربية عضو لجنة المناقشة التاريخ: / /

التوقيع : الاسم : د. حسين على نور الدرجة العلمية : استاذ مساعد العنوان : جامعة القادسية / كلية التربية مشرف وعضو لجنة المناقشة التاريخ: / - 1-

صادقة مدرة كلية التربية / جامعة القادسية على اقرار لجنة المناقشة بتاريخ

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

ellon

إلى :

_ صاحب اليد خفية الألطاف ...أمامي وصاحب زماني ومنقذ الأمة من الغمة المهدي المنتظر عج _ وطنى وانْ جار الزمان عليه يبقى كريمُ ... العراق _ من دافعوا وضحّوا بأغلى ما يملكون ... ابطالنا وشهدائنا الابرار _ من كان للعلم سراجاً ... أساتذة قسم الفيزياء _ المخلصين الذين زادوا الحياة جمالاً ... اصدقائي _ القلب الناصع بالبياض المملوء بالإنسانية والشمعة الذي أنار لي الحياة ... والدي الحبيب _ اوكسجين الحياة والروح التي سكنت روحي اذ كان دعاؤها سر نجاحي وسعادتي ... والدتي الحبيبة _ أغلى ما أملك في هذه الدنيا ... اخواتي _ شريكة حياتي ورفيقة دربي ومن وقفت بجانبي ... زوجتي _ فلذات كبدي من يمشى على الارض ... ابنتي نور الهدى وطيبة

اهديكم هذا العمل المتواضع

د اخل

الشكر والتقطير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية والرسول الامجد ابي القاسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين .

أحمد الله وأشكره على فضله وسابغ نعائه وجزيل عطائه في تسهيل هذا العمل فهو وحده يستحق الحمد والشكر اولأ واخرأ.

يسرني أن اتقدم بالشكر الجزيل والثناء اللامتناهي الى رئاسة قسم الفيزياء في كلية التربية / جامعة القادسية لمنحي هذه الفرصة في إكمال مسيرتي العلمية وما أبدوه من مساعدات وتسهيلات طيلة فترة البحث متمثلة بالدكتور عبدالحسين عباس خضير رئيسا لقسم الفيزياء في السنة التحضيرية والدكتور سليم عزارة حسين رئيسا لقسم الفيزياء في مرحلة البحث .

وأُقدم شكري وعرفاني بالجميل وانا أضع اللمسات الاخيرة الى المشرف على الرسالة الدكتور حسين علي نــــور لاقتراحه مشروع البحث ومتابعته وتوجيهاته المستمرة لإكمال انجاز هذا البحث ودعائي له بالتوفيق ودوام الصحة والعافية .

وكما أوجه شكري وتقديري الى جميع اساتذة قسم الفيزياء فيكلية التربية / جامعة القادسية لاسيما الاساتذة الذين درسوني في السنة التحضيرية وما أبدوه من تعاون ومساندة وتشجيع طيلة فترة السنة ومرحلة البحث .

كذلك أوجه الشكر الجزيل والثناء الجميل الذي اعجز عن ترجمته بكلمات الى الدكتور الرائع عادل حبيب عمران كلية العلوم / جامعة الكوفة للروح المعطاء التي يحملها وبذله جمد كبير في تدريس مادة (تقنية اجمزة) في السنة التحضيرية .كما اوجه شكري وتقديري الى الاساتذة في جامعة بابل الدكتور رحيم كعيد ، الدكتورة ناهدة الجعيفري ، الاستاذ محمد جاسم /كلية العلوم ، والدكتور فؤاد شاكر ، الدكتور خالد حنين /كلية التربية للعلوم الصرفة لما قدموا لي من تسهيلات وأكمال الفحوصات الكهربائية الخاصة بالبحث .

كما اوجه شكري وتقديري إلى العائلة الكريمة لما منحتني من اهتمام ورعاية ومساندة وتشجيع لا سيما شمعة دربي والدي وأمي الحنون واخواتي وزوجتي وأبنتي نور الهدى وطيبة .كذلك اتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لجميع زملائي وأخص بالذكر استاذ علي عبدالحسين واستاذ باسم عجيل وكذلك أصدقائي المخلصين لوقوفهم معي في انجاز البحث .



في هذا البحث تمت دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأغشية كبريتيد الكادميوم (CdS) النقي بسماك nm (150,300 and 450) والمشوب بالليثيوم والالمنيوم بنسب حجمية (% 7.5 , 7.5) لسُمك nm (450 nm وتم تحضير الاغشية بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي على اغشية زجاجية ودرجة حرارة الحمام (C° 3±75) ومقدار 19.59 وقد تم الحصول عليه بإضافة محلول الامونيا بشكل تناسبي مع خليط الحمام الكيميائي . تم تلدين الاغشية في الهواء عند درجة حرارة C

درست الخواص التركيبية للأغشية من خلال حيود الاشعة السينية حيث بينت النتائج ان جميع الاغشية المرسبة متعددة التبلور من النوع المكعب. والاتجاه المفضل للنمو هو المستوي (111)، وقد تم حساب الحجم البلوري لجميع الاغشية حيث وجد انه يزداد بزيادة السمك ونسب التشويب وبعد التلدين. كذلك وجد إن كثافة الانخلاعات وعدد البلورات والمطاوعة المايكروية تقل قيمتها بزيادة السمك ونسب التشويب وبعد التلدين .وقد تم استخدام المجهر الالكتروني الماسح الذي بوساطته وجد ان الاغشية كثيفة وذات توزيع متجانس وبصورة منتظمة. كما درست مورفولوجيا السطح بواسطة مجهر القوة الذرية (AFM)، وجد ان متوسط الجذر التربيعي وخشونة السطح تزداد بعد التشويب وبعد تلدين اغشية CdS النقي والمشوب بالليثيوم بينما تقل بعد تلدين اغشية CdS

كما درست الخصائص البصرية لاغشية CdS النقية والمشوبة حيث تم تسجيل طيفي النفاذية والامتصاصية ضمن مدى الاطوال الموجية من nm (300-100). وقد بينت النتائج ان النفاذية تقل بزيادة السمك وزيادة نسب تشويب الالمنيوم والليثيوم بينما تزداد بعد التلدين. حافة الامتصاص الأساسية لأغشية CdS تزحف نحو طاقات الفوتون الواطئة (red shift) عند زيادة السمك وزيادة نسب التشويب بالليثيوم والليثيوم الواطئة (red shift) عند زيادة السمك وزيادة نسب تشويب الالمنيوم والليثيوم الواطئة (red shift) عند زيادة السمك وزيادة نسب الأساسية لأغشية CdS تزحف نحو طاقات الفوتون الواطئة (red shift) عند زيادة السمك وزيادة نسب التشويب بالليثيوم والالمنيوم والواطئة (red shift) عند زيادة الممك وزيادة نسب التشويب بالليثيوم والالمنيوم وتزحف نحو طاقات الفوتون العالية (blue shift) بعد التلدين. من خلال قيم معامل الامتصاص الذي تم حسابه من طيف الامتصاصية وهو اكبر من. كذلك تم حساب الثوابت البصرية الانعاكسية (R)، معامل الخمود (ه) ومعامل الانكسار (n). فجوة الطاقة الممنوعة لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم والالمنيوم ناوية التوابي الوليكسار (n). فجوة الطاقة المنوعة الثوابت البورية العالية (cd)، معامل الذي تم حساب الثوابت البصرية الانعاكسية (guantum confinement) وذلك نتيجة للحصر الكمي (الكميور داكمي (upantum confinement)).

أما الخواص الكهربائية لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم فقد تضمنت تأثير درجة الحرارة على المقاومة (R) للأغشية ضمن المدى K (303 - 303). وتم حساب التوصيلية الكهربائية وطاقة التنشيط، حيث كانت النتائج تشير الى وجود طاقتي تنشيط وهذا يعني وجود ميكانيكيتين توصيل . كذلك تبين من خلال قياسات تأثير هول أن اغشية CdS النقية والمشوبة تمتلك توصيلية من النوع السالب (n-type).

رقم الصفحة	العنوان	الفقرة
I	المحتويات	-
IV	قائمة الجداول	-
V	قائمة الاشكال	-
VIII	قائمة الرموز والوحدات	-
1-14	مقدمة عامة	الفصل الاول
1	المقدمة	(1-1)
2	تصنيف المواد الصلبة	(2-1)
2	العوازل	(1-2-1)
2	اشباه الموصلات	(2-2-1)
3	الموصلات	(3-2-1)
3	خصائص اشباه الموصلات	(3-1)
4	اشباه الموصلات النقية	(4-1)
4	اشباه الموصلات المشوبة	(5-1)
5	مجموعة مركبات (٧١-١١) الشبه موصلة	(6-1)
5	خصائص الترسيب بالحمام الكيميائي	(7-1)
6	الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمركب (CdS)	(8-1)
7	خواص الالمنيوم	(9-1)
8	خواص الليثيوم	(10-1)
10	الدر اسات السابقة	(11-1)
14	الهدف من البحث	(12-1)
15-32	نظريات ومفاهيم اساسية	الفصل الثاني
15	المقدمة	(1-2)
15	تركيب المواد الصلبة	(2-2)
15	المواد البلورية	(1-2-2)
15	المواد العشوائية	(2-2-2)
16	التبلور النانوي لأغشية اشباه الموصلات	(3-2)
17	الحصر الكمي	(4-2)
18	الخواص التركيبية	(5-2)
18	حيود الاشعة السينية	(1-5-2)
19	المعلمات التركيبية	(2-5-2)

21	المجهر الالكتروني الماسح	(3-5-2)
22	مجهر القوة الذرية	(4-5-2)
23	الخصائص البصرية	(6-2)
23	الانتقالات الالكترونية	(7-2)
23	الانتقال المباشر	(1-7-2)
24	الانتقال الغير مباشر	(2-7-2)
25	النفاذية البصرية	(8-2)
26	الامتصاصية البصرية	(9-2)
26	الانعكاسية البصرية	(10-2)
26	الثوابت البصرية	(11-2)
27	معامل الامتصاص	(1-11-2)
28	معامل الانكسار	(2-11-2)
28	معامل الخمود	(3-11-2)
29	فجوة الطاقة البصرية	(4-11-2)
29	التوصيلية الكهربائية	(12-2)
30	تأثير هول	(13-2)
32	التلدين	(14-2)
33-42	الجزء العملي	الفصل الثالث
33-42 33	الجزء العملي المقدمة	الفصل الثالث (1-3)
33-42 33 34	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي	الفصل الثالث (1-3) (2-3)
33-42 33 34 35	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3)
33-42 33 34 35 35	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3)
33-42 33 34 35 35 35 35	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3)
33-42 33 34 35 35 35 35 37	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تلدين الاغشية الرقيقة	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3)
33-42 33 34 35 35 35 35 37 37 37	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تلدين الاغشية الرقيقة القياسات	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (5-3)
33-42 33 34 35 35 35 35 37 37 37 37	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تلدين الاغشية الرقيقة القياسات قياس السمك	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (5-3) (1-5-3)
33-42 33 34 35 35 35 37 37 37 37 38	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تحضير المحاليل القياسات قياس السمك تقنية حيود الاشعة السينية	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (5-3) (1-5-3) (2-5-3)
33-42 33 34 35 35 35 37 37 37 37 38 39	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تحضير المحاليل القياسات القياسات قياس السمك تقنية حيود الاشعة السينية المجهر الالكتروني الماسح	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (5-3) (1-5-3) (2-5-3) (3-5-3)
33-42 33 34 35 35 35 37 37 37 37 38 39 39 39	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تحضير المحاليل القياسات القياسات قياس السمك تقنية حيود الاشعة السينية المجهر الالكتروني الماسح مجهر القوى الذرية (AFM)	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (1-5-3) (1-5-3) (2-5-3) (3-5-3) (4-5-3)
33-42 33 34 35 35 35 37 37 37 37 38 39 39 39 39	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تحضير المحاليل العياسات القياسات قياس السمك قياس السمك تقنية حيود الاشعة السينية المجهر الالكتروني الماسح مجهر القوى الذرية (AFM) القياسات البصرية	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (1-5-3) (1-5-3) (2-5-3) (3-5-3) (4-5-3) (4-5-3) (6-3)
33-42 33 34 35 35 35 37 37 37 37 38 39 39 39 39 39 40	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تحضير المحاليل القياسات القياسات قياس السمك قياس السمك تقنية حيود الاشعة السينية تقنية حيود الاشعة السينية المجهر الالكتروني الماسح مجهر القوى الذرية (AFM) القياسات البصرية القياسات الكهربائية	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (1-5-3) (2-5-3) (2-5-3) (3-5-3) (3-5-3) (4-5-3) (4-5-3) (6-3) (7-3)
33-42 33 34 35 35 37 38 39 39 40 40	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تحضير المحاليل الذين الاغشية الرقيقة تالدين الاغشية الرقيقة القياسات تقنية حيود الاشعة السينية المجهر اللكتروني الماسح مجهر القوى الذرية (AFM) القياسات الكهربائية تحضير الاقنعة	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (1-5-3) (2-5-3) (2-5-3) (3-5-3) (3-5-3) (4-5-3) (4-5-3) (6-3) (7-3) (1-7-3)
33-42 33 34 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 39 39 40 40 40 41	الجزء العملي المقدمة منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي ترسيب الاغشية الرقيقة تنظيف الارضيات تحضير المحاليل تحضير المحاليل القياسات القياسات قياس السمك تقنية حيود الاشعة السينية تقنية حيود الاشعة السينية مجهر القوى الذرية (AFM) القياسات الكهربائية القياسات الكهربائية قياس تأثير هول	الفصل الثالث (1-3) (2-3) (3-3) (1-3-3) (2-3-3) (4-3) (1-5-3) (2-5-3) (2-5-3) (3-5-3) (3-5-3) (4-5-3) (4-5-3) (6-3) (7-3) (1-7-3) (2-7-3)

43-88	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
43	المقدمة	(1-4)
43	نتائج القياسات التركيبية	(2-4)
43	نتائج حيود الاشعة السينية	(1-2-4)
49	نتائج المعلمات التركيبية	(2-2-4)
54	نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح	(3-2-4)
56	نتائج قياسات مجهر القوة الذرية	(4-2-4)
59	نتائج القياسات البصرية	(3-4)
59	النفاذية	(1-3-4)
61	الامتصاصية	(2-3-4)
64	الانعكاسية	(3-3-4)
66	معامل الامتصاص	(4-3-4)
70	معامل الانكسار	(5-3-4)
72	معامل الخمود	(6-3-4)
76	فجوة الطاقة البصرية	(7-3-4)
79	نتائج القياسات الكهربائية	(4-4)
80	المقاومة النوعية	(1-4-4)
82	طاقة التنشيط	(2-4-4)
86	تأثير هول	(3-4-4)
87	الاستنتاجات	(5-4)
88	المشاريع المستقبلية	(6-4)
89	المصادر	-

قائدة الأسابي

رقم الصفحة	العنوان	الفقرة
1-14	مقدمة عامة	الفصل الاول
6	بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمركب CdS	(1-1)
8	بعض الخواص الفيزيائية والكيمائية لعنصر Al	(2-1)
9	بعض الخواص الفيزيائية والكيمائية لعنصر Li	(3-1)
33-42	الجزء العملي	الفصل الثالث
37	المعلمات المستخدمة في عملية الترسيب	(1-3)
37	النسب الحجمية للمحاليل المستخدمة لتحضير الاغشية	(2-3)
43-88	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
45	نتائج حيود الاشعة السينية لأغشية CdS لسُمك nm(150,300,450) قبل وبعد التلدين	(1-4)
48	نتائج حيود الاشعة السينية (XRD) لأغشية كبريتيد الكادميوم (CdS) والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم بنسب %(2.5,5,7.5) قبل وبعد التلدين	(2-4)
53	نتائج المعلمات التركيبية لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين	(3-4)
58	نتائج فحوصات مجهر القوة الذرية (AFM)	(4-4)
79	قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الكترونية المباشرة المسموحة لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين	(5-4)
85	قيم طاقتي التنشيط لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين	(6-4)
86	نتائج قياسات هول لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين	(7-4)

رقم الصفحة	العنوان	الرقم
1-14	مقدمة عامة	الفصل الاول
3	معامل التوصيل الكهربائي للعوازل ، أشباه الموصلات و الموصلات	(1-1)
7	التركيب البلوري لمركب CdS المكعب من نوع (Zinc blende)	(2-1)
7	التركيب البلوري لمركب CdS السداسي (HexagonalWurtzite)	(3-1)
15-31	نظريات ومفاهيم اساسية	الفصل الثاني
16	ترتيب الذرات للمواد a: احادية التبلور b: متعددة التبلور c: العشوائية	(1-2)
17	علاقة فجوة الطاقة مع قطر حجم التبلور	(2-2)
18	تدرج مستويات الطاقة ومقدار فجوة الطاقة من الجزيء ، البلورات النانوية والمواد الكتلوية	(3-2)
19	حيود براك والمستويات البلورية	(4-2)
23	التركيب البسيط لمجهر القوة الذرية AFM	(5-2)
25	انواع الانتقالات الالكترونية (a) انتقال مباشر مسموح، (b) انتقال مباشر ممنوع (c) انتقال غير مباشر مسموح ، (d) انتقال غير مباشر ممنوع	(6-2)
31	ظاهرة تأثير هول لشبه الموصل من نوع (n-type)	(7-2)
33-42	الجزء العملي	الفصل الثالث
33	مخطط الخطوات المتبعة في الجزء العملي	(1-3)
34	التركيب البسيط لمنظومة الترسيب بالحمام الكيميائي	(2-3)
39	جھاز (SEM)	(3-3)

40	ج هاز UV-Visible	(4-3)
40	الاقنعة المستخدمة لترسيب الاقطاب الكهربائية	(5-3)
41	جهاز قياس تأثير هول	(6-3)
42	الدائرة الكهربائية المستخدمة لقياس التوصيلية الكهربائية المستمرة	(7-3)
43-88	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
44	حيود الاشعة السينية لأغشية CdS قبل وبعد التلدين لسُمك ,150) nm (450, 300.	(1-4)
46	حيود الاشعة السينية لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم قبل وبعد التلدين	(2-4)
47	حيود الاشعة السينية لأغشية CdS المشوبة بالالمنيوم قبل وبعد التلدين	(3-4)
50	ثابت الشبيكة (a) كدالة لتغير السمك لأغشية CdS ونسب التشويب %(2.5,5,7.5) بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين	(4-4)
51	كثافة الأنخلاعات وعدد البلورات كدالة للسُمك ونسب التشويب قبل وبعد التلدين	(5-4)
52	المطاوعة المايكروية كدالة للسُمك ونسب التشويب (قبل وبعد التلدين)	(6-4)
55	شكل (A-6) صور (SEM) بقوة تكبير (CdS:7.5%Li:d CdS:7.5%Li:c بعد CdS:7.5%Li:d CdS:7.5%Li:c بعد التلدين CdS:7.5%Al:f CdS:7.5%Al:e بعد التلدين	(7-4)
58	صور (AFM) ببعدين (2D) وثلاثة ابعاد (3D) ومخطط التوزيع الاحصائي لمعدلات الحجوم الحبيبية a: CdS:b CdS بعد التلدين CdS:7.5%Li:d CdS:7.5%Li:c بعد التلدين CdS:7.5%Al:f CdS:7.5%Al:e بعد التلدين	(8-4)
59	النفاذية لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm(450 , 300 , 150) قبل وبعد التلدين	(9-4)
60	النفاذية (T) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة a: بالليثيوم b: بالألمنيوم	(10-4)
61	تأثير التلدين على نفاذية أغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم	(11-4)
62	الامتصاصية لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm(450 , 300 , 150) قبل وبعد التلدين	(12-4)
63	الامتصاصية لأغشية (CdS) النقية والمشوبة a: بالليثيوم b: بالألمنيوم	(13-4)

63	تأثير التلدين على امتصاصية أغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم	(14-4)
64	الانعكاسية لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm(450, 300, 150) قبل وبعد التلدين	(15-4)
65	الانعكاسية لأغشية (CdS) النقية والمشوبة a: بالليثيوم b: بالألمنيوم	(16-4)
66	تأثير التلدين على انعكاسية أغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم	(17-4)
67	معامل الامتصاص لأغشية (CdS) النقية لسُمك ,300 , 150) mm(450 قبل وبعد التلدين	(18-4)
68	معامل الامتصاص (α) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والألمنيوم	(19-4)
69	تأثير التلدين على معامل الامتصاص لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم	(20-4)
70	معامل الانكسار لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm(450, 300, 150) قبل وبعد التلدين	(21-4)
71	معامل الانكسار (n) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والألمنيوم	(22-4)
72	تأثير التلدين على معامل الانكسار لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم	(23-4)
74	معامل الخمود لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm(450, 300, 150) قبل وبعد التلدين	(24-4)
74	معامل الخمود لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والألمنيوم	(25-4)
75	تأثير التلدين على معامل الخمود لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم	(26-4)
77	قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الالكترونية المسموحة لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm(450, 300, فبل وبعد التلدين	(27-4)
78	قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الالكترونية المسموحة لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والألمنيوم	(28-4)
79	تأثير التلدين على قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الالكترونية المسموحة لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم	(29-4)
81	المقاومة النوعية (ρ) لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين	(30-4)
82	التوصيلية (σ) لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين	(31-4)
85	طاقتي التنشيط لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين	(32-4)

الوحدة	الوصف	الرمز
-	عدد القمم الظاهرة في قياس حيود الأشعة السينية	Ν
-	عامل التشكيل	Tc
Å	ثوابت الشبيكة	a, b ,c
-	معاملات ميلر	hkl
cm ⁻²	كثافة الانخلاع	δ
-	حيود الاشعة السينية	XRD
cm ⁻²	عدد البلورات لوحدة المساحة	No
Å	المسافة البينية بين المستويات البلورية	d _{hkl}
Å	قيم المسافات البينية في بطاقة ICDD	d _{ICDD}
Å	قيم المسافات البينية المحسوبة من XRD	d _{XRD}
nm	معدل الحجم الحبيبي	D _{av}
-	المطاوعة الميكروية	S
rad	عرض المنحني عند منتصف القمة (FWHM)	β
	Full width at half maximum	SFM
-	محبر القوى الذرية	AFM
- oV	مبهر ,عربي ,حربي ,	
eV	طاقة حذمة التوصيل	Eg F
eV	طاقة حزمة التكافئ	
eV	طاقة الفرزون	
ev	طاقة الفرتين	<u>Ер</u>
eV	صف العولون شدة الاثر ماع البينية ب	
eV/m.s	سدة الإسعاع الممتص شدة الاشحاع الذاذذ	<u>І</u> А Т
eV/m.s		1 _T
ev/m.s	سدة الإسعاع المتعكس	I _R
CPS	السدة العياسية المعاسة من XKD	I _{hkl}
CPS	السّدة القياسية الماخودة من (ICDD)	I _{∘ hkl}
-	الانعكاسية	R

-	معامل الخمود	ko
cm ⁻¹	معامل الامتصاص	α
-	الامتصاصية	Α
-	النفاذية	Т
cm ⁻¹	متجه الموجه	Ŕ
mol/L	النركيز المولاري	Μ
g/mol	الوزن الجزيئي	\mathbf{M}_{wt}
nm	الجذر التربيعي لمربع معدل الخشونة	RMS
cm ²	مساحة الغشاء	Α
ml	حجم الماء المقطر	V
°C	درجة حرارة الترسيب	T_d
nm	الطول الموجي	λ
sec	زمن الترسيب	t _d
deg	زاوية الحيود	θ
m/s	سرعة الضوء	c
-	معامل أسي يعتمد على طبيعة الانتقال الالكتروني	r
-	عامل الشكل (shape factor)	k
nm	معدل خشونة السطح	RA
cm ³ /c	معامل ہول	R _H
cm ² /V.s	تحركية هول	μ_{H}
eV	طاقة التنشيط	Ea
(Ω.cm) ⁻¹	معامل التوصيل الكهربائي	σ
(Ω.cm)	المقاومة النوعية	ρ

المصل الاول aãcaõzlaõ

الغصل الاول

مهدمة غامة

(1-1) المقدمة

Introduction

بدأ الاهتمام بدراسة المواد شبه الموصلة في أوائل القرن التاسع عشر، فقد تم خلال السنين اللاحقة دراسة الكثير من أشباه الموصلات نظراً لتواجد هذه المواد في الطبيعة بشكل كبير جدا ولما تمتاز به من مميزات فريدة من نوعها، حيث تتأثر توصيلة شبه الموصل بالحرارة والضوء والمجال المغناطيسي ووجود كميات ضئيلة من ذرات الشائبة. وأن حساسية الشبه الموصل اتجاه هذه العوامل جعلت منها مادة بالغة الأهمية في التطبيقات الالكترونية .وقد كان استخدام شبة الموصل قبل ظهور الترانزستور في 1946 يقتصر على صناعه النبائط ذات الطرفين (Rectifiers) [1].

الاغشية الرقيقة هي مواد ذات السمك القليل جداً لا يتجاوز المايكرومتر الواحد التي أسهمت في تركيز دراسة الخصائص الفيزيائية لأشباه الموصلات إذ أعطت فكرة عن العديد من خصائص التركيب البلوري والتعرف على طبيعة الانتقالات الالكترونية ومعرفة كفاءتها في مجال التطبيق العملي مما أدى إلى تحضير أغشيه رقيقه وتطوير انتاجها بمواصفات مميزة وتكلفة قليلة [2].

وتستخدم الأغشية الرقيقة في الوقت الحاضر في بناء الدوائر الإلكترونية للنبائط المعقدة، إذ تترسب طبقاتها بعضها فوق البعض الآخر [3]، وللاغشية الرقيقة أهمية كبيرة في تصنيع الخلايا الشمسية (SolarCells)، المتسعات (Capacitors)، المقومات (Rectifiers)، الترانزستورات (Transistors)، المفاتيح الكهربائية (Electrical Switches) والكواشف (Detectors) [4].

تمتاز طريقة الترسيب بالحمام الكيميائي بترسيب اغشية لمساحات واسعة وبتكلفة قليلة مقارنة مع التقنيات الاخرى ، إن الترسيب بالحمام الكيميائي (CBD) المعروف أيضاً ترسيب المحاليل الكيميائية (CSD) كانت لأول مرة في عام 1869، واستخدمت منذ ذلك الحين لترسيب أغشية أشباه الموصلات المختلفة. وربما هو أبسط وسيلة متاحة لهذا الغرض، كل ما هو مطلوب هو وعاء لاحتواء المحلول والقاعدة التي يتعين الترسيب عليها و وضعه داخل حمام مائي للسيطرة على ثبوت درجة الحرارة بالإضافة إلى آلية لتحريك المحلول [5]. مقدمة غامة

Insulators

(2-1) تصنيف المواد الصلبة (2-1) Classification Of Solid Materials

تصنف المواد الصلبة تبعاً إلى ترتيب حزم الطاقة، أو حسب خصائصها الكهربائية الى ثلاثة أنواع من المواد هي العوازل، أشباه الموصلات والموصلات [6] كما في الشكل(1-1).

(1-2-1) العوازل

هي المواد التي تكون فيها فجوة الطاقة كبيرة جداً وبحدود (5eV) ، وتفصل تماماً كل مستويات حزمة التوصيل الفارغة عن حزمة التكافؤ المملؤة ، إذ يكون عرض حزمة التوصيل وعرض حزمة التكافؤ صغيراً مقارنة بفجوة الطاقة بين الحزمتين[7].

وتشكل إلكترونات التكافؤ أواصر قوية ما بين الذرات المتجاورة، ويصعب كسر هذه الآصرة إلا بالطاقات العالية، وعليه فأنه ينعدم وجود إلكترونات التوصيل في حزمة التوصيل، ولا يوجد غاز إلكتروني في هذه المواد ، لهذا لا يمكن للمجال الكهربائي المسلط ولا للطاقة الحرارية العاديين أن يهيجا الإلكترونات في أعلى حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل، وبذلك لا يمكن للتيار أن يسري بسهولة وبذلك تصبح التوصيلة الكهربائية واطئة جداً في مدى ¹⁻(Ω.cm) (⁸⁻¹⁰ – ¹⁰-10) [6].

Semiconductors

(1-2-2) أشباه الموصلات

هي المواد التي تكون خصائصها الكهربائية واقعة بين العوازل و الموصلات ، وذلك بسبب ترتيبها الخاص من الإلكترونات في مستويات الطاقة [8]، هذه الخواص المتوسطة تحدد كل من تركيب البلورة وحزم طاقة الإلكترون وميزة الأصرة [9].

تمتاز أشباه الموصلات بوجود فجوة طاقة صغيرة نسبياً بين قمة حزمة التكافؤ وقعر حزمة التوصيل تتراوح بين və(cs = 0) ، لذلك يمكن لبعض إلكترونات التكافؤ عبور فجوة الطاقة التوصيل تتراوح بين v=(cs = 0) ، لذلك يمكن لبعض إلكترونات التكافؤ عبور فجوة الطاقة المحظورة إلى حزمة التوصيل ، تاركة فجوات في حزمة التكافؤ، وبفعل المجال الكهربائي المسلط تكتسب الإلكترونات في حزمة التوصيل وكذلك الفجوات في حزمة التكافؤ ماقة حركية تساهم في التوصيل الكترونات في حزمة التكافؤ ، وبفعل المجال الكهربائي المسلط وكنسب الإلكترونات في حزمة التوصيل وكذلك الفجوات في حزمة التكافؤ، وبفعل المجال الكهربائي المسلط وكذلك الفجوات في حزمة التكافؤ ماقة حركية تساهم في التوصيل الكترونات في حزمة التكافؤ ماقة حركية تساهم في التوصيل الكهربائي وبذلك فإن التوصيلية الكهربائية في أشباه الموصلات هي أصغر من الموصلات ولكنها أكبر من العوازل في مدى أم

الغصل الأول

تمتلك المعادن ما يسمى الغاز الإلكتروني الحر (Free Electron Gas)، وهو عبارة عن غيمة من الإلكترونات السالبة التي توجد في كل أجزاء المعدن [11] ، إذ تكون حزمة التوصيل مملؤة بهذه الإلكترونات، وتتحرك تحت تأثير المجال المغناطيسي أو الكهربائي الاعتيادي المسلط والمسبب للتداخل الحاصل بين حزم التكافؤ والتوصيل لذلك فإن جزءاً من الإلكترونات في حزمة التكافؤ تسهم في عملية التوصيل وتجعل المعدن بأعلى توصيلية كهربائية في مدى ¹ ($\Omega.cm$)($\Omega.cm$)



شكل (1-1) معامل التوصيل الكهربائي للعوازل ، أشباه الموصلات و الموصلات [1].

Semiconductors properties

(1-3) خصائص اشباه الموصلات

تكون أشباه الموصلات النقية مواد عازلة تامة، عند درجة حرارة الصفر المطلق (0k) ولكن خصائصها الكهربائية تتأثر عند زيادة درجة الحرارة، وذلك لتهيج الإلكترونات حرارياً (Thermal Excitation) خلال فجوة الطاقة (E_g) وإنتقالها من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل، ونتيجة لذلك تساهم كل من الفجوات في حزمة التكافؤ والإلكترونات في حزمة التوصيل في زيادة التوصيلية الكهربائية [13] ، وتتأثر خواصها أيضاً في إضافة بعض الشوائب (Impurities)، أو إحداث بعض عيوب الشبيكة (Lattice Defects) التي تؤدي إلى زيادة توصيلية شبه الموصل وإلى ظهور نوع

Conductors

الغصل الاول

واحد من حاملات الشحنة وتضاؤل النوع الآخر [14]، إن الاختلاف بين أشباه الموصلات والعوازل هو مقدار فجوة الطاقة الممنوعة (E_g) عند درجة حرارة الصفر المطلق (8° 0)، وأهم صفة لشبه الموصل التي تميزه عن الموصل والعازل هو امتلاكه مقاومة ذات معامل حراري سالب ووجود فجوة طاقة معتدلة [15,16].

Intrinsic Semiconductors

تدعى أشباه الموصلات النقية والخالية من الشوائب بأشباه الموصلات الذاتية مثل (Si, Ge) النقي، وتكون حزمة التكافؤ في درجة الصفر المطلق مملوءة كلياً بالإلكترونات، في حين ستكون حزمة التوصيل فارغة، وعند رفع درجة حرارة شبه الموصل الذاتي فإن عدداً معيناً من الالكترونات الموجودة في حزمة التكافؤ يمكن أن تثار حرارياً وتنتقل إلى حزمة التوصيل تاركة خلفها عدداً من الموجودة في حزمة التكافؤ يمكن أن تثار حرارياً وتنتقل إلى حزمة التوصيل تاركة خلفها عدداً من الموجودة في حزمة التوصيل فارغة، وعند رفع درجة حرارة شبه الموصل الذاتي فإن عدداً معيناً من الالكترونات الموجودة في حزمة التكافؤ يمكن أن تثار حرارياً وتنتقل إلى حزمة التوصيل تاركة خلفها عدداً من الفجوات (Holes)، حيث إن الالكترونات (Electrons) التي تصل حزمة التوصيل ستملأ هذه الحزمة جزيئاً وتكون جاهزة للتوصيل الكهربائي عند تسليط مجال كهربائي عليها ، أما الفجوات المتكونة في حزمة التكافؤ سوف تملأ مباشرة بوساطة الكترونات مجاورة متحركة باتجاه معاكس المتكونة في حزمة التكافؤ سوف تملأ مباشرة بوساطة الكترونات مجاورة متحركة باتجاه معاكس المتكونة في حزمة التكافؤ سوف تملأ مباشرة بوساطة الكترونات مجاورة متحركة باتحاه معاكس المتكونة في حزمة التكافؤ سوف تملاً مباشرة بوساطة الكترونات مجاورة متحركة باتجاه معاكس المتكونة في حزمة المجال وهذا النوع يحتوي على نفس العدد المتساوي من حاملات الشحنة السالبة والموجبة (الالكترونات والفجوات) [17] ، وإن مستوى (فيرمي) يقع في منتصف فجوة الطاقة المحظورة في أشباه الموصلات النقية [18].

Extrinsic Semiconductors

(1-5) أشباه الموصلات المشوبة

تدعى عملية الإضافة المتعمدة للشوائب إلى شبه الموصل النقي بالتطعيم (doping) وهي عملية مستحسنة فيها لمعظم التطبيقات، لهذا فإن شبه الموصل المشوب يصنف إلى نوعين حسب نوع الشوائب المضافة إليه الأول شبه الموصل من نوع (n-type) ويسمى بالنوع السالب لأنّ حاملات الشحنة الأغلبية فيها (Minority Carries) هي الإلكترونات وحاملات الشحنة الاقلية (Minority Carries) هي الفجوات، والثاني هو شبه موصل من النوع الموجب (P-type) لكون حاملات الشحنة الغالبية فيه هي الفجوات، أما بالنسبة لمستوى (فيرمي) في أشباه الموصلات المشوبة، نجده في شبه الموصل من النوع السالب يُزاح مقترباً من حزمة التوصيل و يقترب من حزمة التكافؤ في شبه الموصل من النوع الموجب [17,19].

(4-1) اشباه الموصلات النقية

الغصل الأول

(6-1) مجموعة مركبات (II-VI) الشبه موصلة

Group (II-VI) semiconductor

مجموعة (II-VI) الشبه موصلة تتألف من المجموعة الثانية والمجموعة السادسة من الجالكوجينات من الجدول الدوري ، ومن بين تلك أشباه الموصلات هي (ZnO, ZnS, ZnSe,) الجالكوجينات من المدوري ، ومن بين تلك أشباه الموصلات هي (ZnTe, CdO, CdS, CdSe, CdTe) حيث جذبت الكثير من المهتمين بتطبيقات الخلايا الشمسية، الثنائيات الباعثة للضوء، ليزر اشباه الموصلات، وأجهزة الاستشعار البصرية وغيرها من التطبيقات الألكتر وضوئية، إن مجموعة أشباه الموصلات الحي مواد ذات فجوة مباشرة التي تتراوح بين الإلكتر وضوئية، إن مجموعة أشباه الموصلات الحالة هي مواد ذات فجوة مباشرة التي تتراوح بين eV (3.7 - 1.5) [20].

(1-1) خصائص الترسيب بالحمام الكيميائى Characteristics of CBD

تعد تقنية الترسيب بالحمام الكيميائي هي إحدى تقنيات الترسيب للأغشية الرقيقة مع وجود المميزات الاتية التي تتميز بها :

.1 تقنية بسيطة مقارنة مع التقنيات الاخرى حيث لا تحتاج الى مجهزات قدرة عالية [21].

- إمكانية إستخدامها لترسيب مساحات كبيرة بصورة منتظمة حيث تقوم بتغطية السطوح الخشنة بطريقة سهلة ومثالية [22].
- 3. تكون تقنية الترسيب بالحمام الكيميائي ذات تكلفة منخفضة حيث تكون مكوناتها رخيصة الثمن مقارنة بتقنيات الترسيب الاخرى مثل تقنية الترسيب بالفراغ [23].

يمكن ترسيب الاغشية على جميع انواع الارضيات (الزجاج ، البوليمر ، السيراميك) لأنها

ترسب بدرجات حرارة منخفضة (اقل من 2° 90)، وعلى نقيض ذلك في الرش الكيميائي الحراري أو التبخير في الفراغ تستخدم عدد محدود من الارضيات التي تستطيع أن تقاوم إرتفاع درجات الحرارة أو التآكل الكيميائي الحراري [24].

(CdS) الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمركب (CdS)

Physical and chemical properties of (CdS)

كبريتيد الكادميوم (CdS) مادة شبه موصلة ، من عناصر المجموعة (الثانية - السادسة [U-II]) التركيب البلوري لمادة (CdS) هو المكعب (Zinc blende))، أو السداسي (Hexagonal) التركيب البلوري لمادة (CdS) هو المكعب (Zinc blende))، أو السداسي (Hexagonal) (وراد تعاد التوالي [18]. الأصرة التي تربط بين أيونات الكبريت والكادميوم هي آصرة تساهمية ناتجة عن اشتراك الكترونين بين ذرة الكادميوم والكبريت، وكذلك يمتلك فجوة طاقة مباشرة وتوصيلية ضوئية عالية وعرض فجوة الطاقة هي والكبريت، وكذلك يمتلك فجوة طاقة مباشرة وتوصيلية ضوئية عالية وعرض فجوة الطاقة هي والكبريت، وكذلك يمتلك فجوة طاقة مباشرة وتوصيلية ضوئية عالية وعرض فجوة الطاقة هي والكبريت، وكذلك يمتلك فجوة الغرفة [25]، لذلك فإن الطول الموجي القاطع (μο 2.42 eV) في منطقة اللون الاخضر (green) من الطيف المرئي. نستنتج من ذلك أن الغشاء يكون ذا إمتصاصية نافذة . إن مادة (CdS) لها لون أصفر مائل للبرتقالي (greonal) [26]، ونوع عند الأطوال الموجية الطويلة الصفراء والحمراء تكون انفذة . إن مادة (CdS) في طبيعتها هي (m-type) ويمكن أن تكون نوع (p-type) اعتماداً على عملية لمادة (CdS) في طبيعتها هي (n-type) ويمكن أن تكون نوع (p-type) اعتماداً يعى عملية التحضير، أو بإضافة بعض الشوائب مثل (n-type) ويمكن أن تكون نوع (p-type) اعتماداً يوضي يلية لمادة (CdS) في طبيعتها هي (n-type) ويمكن أن تكون نوع (p-type) اعتماداً يوضي علي عملية التحضير، أو بإضافة بعض الشوائب مثل (n-type) ويمكن أن تكون نوع (p-type) اعتماداً يوضي علي عملية المادة (CdS) في طبيعتها هي (n-type) ويمكن أن تكون نوع (p-type) اعتماداً التوصيلية لمادة (CdS) في طبيعتها هي (n-type) ويمكن أن تكون نوع (p-type) اعتماداً التوصيلية لمادة (CdS) في طبيعتها هي (n-type) ويمكن أن تكون نوع (p-type) التوصيلية لمركب (CdS) التوصيلية الرحكر).

Properties	Specification
Molecular formula	CdS
Molecular Weight	144.46 g/mole
Band Gap	2.42 eV at RT
Color	Yellow
Mlting temperature	2023 [°] K
Absorption coefficient	$10^{5} cm^{-1}$
The refractive index	2.3, 2.26
Dielectric constant	8.64
Density	4.82 g/cm ³ at 293 $^{\circ}K$

جدول (1-1) بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمركب CdS[28].



شكل (2-1) التركيب البلوري لمركب CdS المكعب من نوع (Zinc blende) [11].



شكل (1-3) التركيب البلوري لمركب CdS السداسي (Wurtzite) [11].

Properties of Aluminum

(9-1) خواص الالمنيوم

الألمنيوم عنصر من الزمرة الثالثة في الجدول الدوري الخواص الرئيسية التي تستند إليها مادة الألمنيوم هي كثافتها المنخفضة حوالي 2.7 g/cm³، القوة الميكانيكية العالية التي يمتلكها عند إضافته الى عناصر سبيكة . وهناك خصائص أخرى تتضمن التوصيلية الحرارية عالية ،موصل جيد

للكهربائية ، الانعكاسية ، ليونة عالية ،وانخفاض تكلفة إنتاجه ، ويمتلك خصائص بارا مغناطيسية ، وبما انه مادة غير سامة وطبيعة اللون الذي ومقاومته العالية للتآكل عالية لذلك يسهل استخدامه في الصناعات الكيميائية وتجهيز الأغذية [29]. والجدول (2-1) يوضح أهم الخصائص الفيزيائية والكيميائية للألمنيوم .

Properties	Specification
Classification	Metallic
Color	Silvery-white
Crystal structure	Face centered cubic
Density	2.7 g/cm ³ at 293 K
Boiling point	2740 [°] K
Melting point	933.15 [°] K
Standard state	Solid at 293 °K
Ionic radius	0. 57 Å
Atomic weight (g/mol)	26.98

جدول (1-2) بعض الخصائص الفيزيائية والكيمائية لعنصر AI [28].

Properties of Lithium

(10-1)خواص الليثيوم

الليثيوم هو العنصر الاول الذي ينتمي الى الزمرة الثانية التي تحتوي على إلكترون احادي التكافؤ ، وتسمى عناصر المجموعة الأولى المعادن القلوية، و يمتلك الليثيوم لون أبيض - فضي ، ولكنه يتحول في دقيقة أو نحو ذلك في الهواء لإعطاء سطح رمادي، ويهيمن على كيمياء هذا الميل إلى فقدان الإلكترون لتشكيل ⁺Li، ويستخدم الليثيوم كسبيكة مع الألمنيوم والمغنيسيوم للسبائك خفيفة الوزن، ويستخدم أيضا في البطاريات، وبعض النظارات، وفي الطب، لا يوجد الليثيوم كمعدن حر في الطبيعة بسبب تفاعله العالي. ومن بين أهم خصائص الليثيوم هي [30]:

الحرارة النوعية والموصلية العالية.

الغصل الاول

اللزوجة المنخفضة.

الكثافة المنخفضة.

وترد بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لليثيوم في الجدول (1-3).

جدول (1-3) بعض الخصائص الفيزيائية والكيمائية لعنصر Li [28].

Properties	Specification
Classification	Metallic
Color	silvery white/grey
Atomic mass	6.941 amu
Atomic weight	74.693 g/mol
Crystal structure	Body centered cubic
Standard state	solid at 298 °K
Density	$0.53 g/cm^3 at 293 ^{\circ}K$
Melting point	453.5 °K
Boiling point	1615 [°] K
Ionic radius	0.76 Å

Literature Survey

(11-1) الدراسات السابقة

قام الباحث (Jae-Hyeong Lee) وجماعته [31] سنة (2003) بدراسة الخصائص الكهربائية والتركيبية لأغشية CdS النقية والمشوبة بالبورون المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي والمرسبة على ارضيات زجاجية بدرجة حرارة ترسيب C° 75 وكان مصدر أيونات الكادميوم هو الملاح خلات الكادميوم ومصدر الكبريت هو الثايوريا ، وعند دراسة الخصائص التركيبية وجد أن

الغصل الأول

مهدمة عامة

الاغشية متعددة التبلور من النوع السداسي والمستو المفضل للنمو هو (002)، ومن خلال دراسة الخواص الكهربائية وجد أن المقاومية تقل بزيادة تركيز ايونات البورون بسبب زيادة تركيز حاملات الشحنة .

قامت الباحثة (Selma. M. Al-Jawad) [24] سنة (2006) بدراسة بعض الخصائص الفيزيائية على اغشية CdS المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي والمرسبة على ارضيات زجاجية مع تلدين الاغشية بدرجة حرارة (C° C° 500 , 400 , 450 , 000) لمدة نصف ساعة كذلك تلدين الاغشية لأزمان مختلفة min (15,30,45,60,90) وبدرجة حرارة (C° 300) وإن أفضل الظروف للتلدين هي عند درجة حرارة (C° 300) ،ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية وجدت ان الاغشية الاغشية بدرجة حرارة (C° 300) ،ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية وجدت ان الاغشية متعددة التبلور من النوع السداسي والمكعب وأن الحجم الحبيبي يزداد بزيادة السمك وعند تلدين الاغشية بدرجة حرارة (C° 300) لا يتغير الطور مع زيادة الحجم الحبيبي عند التلدين ، ومن خلال دراسة الخصائص الكهربائية وجدت ان المقاومة تقل بزيادة درجة الحرارة والمقاومية تقل والتوصيلية تزداد عند تلدين الاغشية المحضرة بدرجة حرارة (C° 300) مون خلال دراسة الخصائص البصرية وجدت ان فجوة الطاقة البصرية لأغشية تزداد عند التلدين بدرجة حرارة (C° 300) وكانت ترداد الناز والمقاومة تقل بزيادة درجة الحرارة والمقاومية تقل والتوصيلية تزداد عند تلدين الاغشية المحضرة بدرجة حرارة (C° 300) ، ومن خلال دراسة الخصائص للبصرية وجدت ان فجوة الطاقة البصرية لأغشية تزداد عند التلدين بدرجة حرارة (C° 300) وكانت بمقدار 20 2.85 وهي اكبر من فجوة الطاقة القياسية 2.42 ولا يند التلدين بدرجة حرارة (C° 300) وكانت للبلورات النانوية .

درس الباحث (Jae-Hyeong Lee) [32] سنة (2007) تأثير الارضيات المختلفة على الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية CdS المحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي ، وباستخدام طيف حيود الاشعة السينية وجد ان الاغشية المرسبة على ارضيات زجاجية متعددة التبلور ذات طور مختلط (مكعب – سداسي) وعند دراسة الخصائص البصرية وجد ان النفاذية تزداد بزيادة الطول الموجي وكانت فجوة الطاقة البصرية للاغشية المرسبة على الارضيات الزجاجية 0 عن 2.37 الح

قام الباحث (F. Yakuphanoglu) وجماعته[33] سنة (2009) تأثير السمك على الثوابت البصرية لأغشية CdS المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي المرسبة على ارضيات زجاجية ، ومن خلال در اسة الخصائص البصرية تبين ان الامتصاصية تزداد بزيادة السمك ، النفاذية تقل بزيادة سمك الاغشية ، الانعكاسية تزداد بزيادة السمك .

قام الباحث (Bharat N.) وجماعته[34] سنة (2011) الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية CdS المشوب بالألمنيوم بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي على ارضيات زجاجية وكانت درجة حرارة الترسيب 2°85 و pH:10.5 ، ومن خلال دراسة حيود الاشعة السينية تبين الاغشية متعددة التبلور ذات طورين سداسي ومكعب، وعند التشخيص بالمجهر الالكتروني الماسح (SEM) وجدت ان جميع العينات المحضرة منتظمة بصورة مستمرة دون وجود فراغات او فجوات ، ومن خلال طيف اشعة UV-Visible تم حساب فجوة الطاقة البصرية وتبين ان فجوة الطاقة البصرية تقل بزيادة نسب التشويب eV (2.32 – 2.41) .

قام الباحثان (A. Hasnat and J. Podder) [35] سنة (2012) بدراسة خصائص العزل الكهربائي لأغشية CdS النقي والمشوب بالألمنيوم المحضر بطريقة الرش بالتحلل الحراري على أرضيات زجاجية، من خلال التشخيص بالمجهر الالكتروني الماسح (SEM) تبين ان الاغشية موزعة بانتظام ، ومن خلال دراسة الخصائص البصرية تبين ان النفاذية تزداد بزيادة الطول الموجي وتكون زيادة سريعة عند الطول الموجي 500nm ، معامل الامتصاص ومعامل الخمود لأغشية CdS يزداد بزيادة نسب تشويب الالمنيوم من نسبة (%9-1) وبعد نسبة (%9) يبدأ بالانخفاض بزيادة نسب التشويب .

حضر الباحث (Panda) وجماعته[36] سنة (2012) أغشية CdS النقي والمشوب بالنحاس بطريقة التحلل الكيميائي الحراري بدرجة حرارة (C^o 350) ومن خلال طيف حيود الاشعة السينية وجد أن جميع الاغشية متعددة التبلور ذات الطور السداسي وأن الحجم الحبيبي يزداد بزيادة نسب التشويب وان أيون النحاس يكون استبدالياً ، ودرس الخصائص البصرية فلاحظ أن النفاذية تقل مع زيادة نسب تشويب النحاس وأن فجوة الطاقة تقل بزيادة نسب تشويب النحاس.

قام الباحث (U. Sandoval) وجماعته[37] سنة (2013) بدراسة الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية CdS النقي والمشوب بالليثيوم المحضرة بطريقة التحلل الحراري فوجد ان جميع الاغشية متعددة التبلور ذو الطور المكعب دون وجود قمم اضافية عند التشويب وهذا يعني أن أيونات الليثيوم شغلت مواقع استبدالية ، وقد تم حساب الحجم الحبيبي ووجد أنه يزداد بزيادة نسب التشويب ، وتمت دراسة الخصائص البصرية وجد أن فجوة الطاقة البصرية تقل بزيادة نسب التشويب من 3.6– 2.7)

قامت الباحثة (Munirah) وأخرون[38] سنة (2013) بدراسة طيفية لأغشية CdS النانوية المحضرة بطريقة (Sol- gel) المرسبة على ارضيات زجاجية واستعملت خلات الكادميوم كمصدر لأيونات الكادميوم والثايوريا كمصدر لأيونات الكبريت ، ومن خلال فحص طيف حيود الاشعة السينية تبين أن الاغشية متعددة التبلور عند الزاويا (43 , 65=20) وتمتلك حبيبات نانوية ، ومن خلال التشخيص بالمجهر الالكتروني الماسح (SEM) وجد انها اغشية متجانسة خالية من الفجوات والثقوب

الغصل الأول

مهدمة غامة

، ومن خلال در اسة الخصائص البصرية تبين ان فجوة الطاقة البصرية اكبر من فجوة الطاقة القياسية (2.42 eV) و هذا بسبب الحصر الكمي للبلورات النانوية .

قام الباحث (M. Muthusamy) وجماعته [39] سنة (2014) بدراسة الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية CdS النقية والمشوبة بالألمنيوم والمحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي والمرسبة على أرضيات زجاجية وكانت درجة حرارة الترسيب C° 80 ، ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية وجد أن الاغشية النقية والمشوبة متعددة التبلور ذات طور مكعب ولا يتغير الطور عند التشويب والحجم الحبيبي يزداد بزيادة نسب التشويب والمطاوعة تقل ، ومن خلال دراسة الخصائص البصرية وجد أن فجوة الطاقة البصرية تقل بزيادة نسب التشويب.

قام الباحث (H. L. Pushpalatha) وجماعته [40] سنة (2014) بدراسة تأثير التلدين بدرجة حرارة (300°C) لمدة ساعة واحدة على الخصائص البصرية والتركيبة لأغشية CdS المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي المرسبة على أرضيات زجاجية وكانت درجة القاعدية PH:11 ودرجة حرارة الترسيب 20° 80 وبعد دراسة الخصائص التركيبية وجد أن الاغشية متعددة التبلور ذات طورين (سداسي – مكعب) وبعد عملية التلدين يتحول الى الطور السداسي ، كذلك وجد أن الحمر الحبيبي يزداد عند التلدين من nm (87.8 –15.5) ، ومن خلال دراسة الخصائص الجمود يقل النفاذية تزداد بزيادة الطول الموجي وتقل عند التلدين ، ومعامل الامتصاص ومعامل الخمود يقل بزيادة الطول الموجي ويقل عند التلدين ، ومعامل الامتصاص ومعامل الخمود يقل

قام الباحثان (Sol-gel) المرسبة المحضرة المحضرة بطريقة (Sol-gel) المرسبة على اغشية لأغشية CdS على الخصائص التركيبية والبصرية المحضرة بطريقة (Sol-gel) المرسبة على اغشية زجاجية ، وبعد دراسة الخصائص التركيبية للاغشية النقية والمشوبة تبين عدم وجود قمم إضافية بعد التشويب مما يؤكد إن أيونات الليثيوم سلكت سلوك استبدالي وكانت جميع الاغشية متعددة التبلور من النوع السداسي كما وجد ان المطاوعة المايكروية وكثافة الانخلاعات تقل بزيادة نسب التشويب ، ومن خلال فحص مجلس النوع السداسي كما وجد ان المطاوعة المايكروية وكثافة الانخلاعات تقل بزيادة نسب التشويب ، ومن خلال فحص مجلس النوع السداسي كما وجد ان المطاوعة المايكروية وكثافة الانخلاعات تقل بزيادة نسب التشويب ، كذلك وجد ان الحجم الحبيبي يزداد ضمن المدى nm (1.111 - 8.66) ، ومن خلال فحص مجلس تتبين إن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي يزداد بزيادة نسب تشويب الليثيوم ، ومن خلال دراسة تتبين إن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي يزداد من المدى nm (1.111 - 1.66) ، ومن خلال دراسة تتبين إن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي يزداد بزيادة نسب التشويب ، ومن خلال دراسة تتبين إن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي درادة نسب التشويب ما وجد ان الملوم ومعدل الجزر التربيعي يزداد من المدى nm (1.111 - 1.66) ، ومن خلال دراسة تتبين إن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي يزداد بزيادة نسب التشويب ومعامل الامتصاص يزداد بزيادة نسب التشويب من 40 الامتصاص يزداد بزيادة نسب التشويب ما 40 المي ما ما مراسة الخصائص البصرية تبين ان النفاية تقل بزيادة نسب التشويب ومعامل الامتصاص يزداد بزيادة نسب التشويب من 40 (1.200) وهي قيمة الخرار من وهوة الطاقة البصرية تقل بزيادة نسب التشويب من 40 (2.300) وهي قيمة الخرار من وهوة الطاقة القياسية لأغشية 2.00

قام الباحث (2016) بدراسة تأثير السمك على (Z. Makhdoumi-Kakhaki) المحضرة بطريقة الترسيب الخصائص البصرية والكهربائية والكشافات الضوئية لأغشية CdS المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي حيث بين تحليل حيود الاشعة السينية ان الاغشية متعددة التبلور ذو طورين (مكعب وسداسي)، وجد ان الحجم البلوري يزداد بزيادة السمك والمطاوعة المايكروية تقل بزيادة السمك، ومن خلال نتائج الفحوصات البصرية تبين ان النفاذية تقل بزيادة السمك ، الامتصاصية تزداد بزيادة السمك من eV)، ومن خلال الفحوصات البصرية تبين ان النفاذية تزداد بزيادة السمك ، وفجوة الطاقة البصرية تقل بزيادة السمك ، وفجوة الطاقة البصرية تقل بزيادة السمك من eV (2.73-2.49)، ومن خلال الفحوصات المعرية تقل بزيادة السمك من eV) ومن خلال الفحوصات البصرية تبين ان النفاذية تزداد بزيادة السمك ، وفجوة الطاقة البصرية تعل بزيادة السمك من eV) و المطاوعة المحليان الفحوصات الكهربائية تبين ان تركيز وتحركية حاملات الشحنة تزداد بزيادة السمك.

قام الباحثان (Bijumon C. C. and V. Senthil Kumar) [43] سنة (2016) بدراسة تأثير هول على اغشية CdS المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي والمرسبة على ارضيات زجاجية والملدنة بدرجة حرارة C^o 200 لمدة h 1.5 ، ومن خلال نتائج تأثير هول تبين ان الاغشية من نوع (n-type) كذلك وجد أن المقاومية تقل عند التلدين بينما التوصيلية ومعامل هول والتحركية لحاملات الشحنة تزداد عند التلدين، كذلك وجد ان تركيز حاملات الشحنة يقل عند التلدين .

درس الباحث (Ligang Ma)وجماعته[44] سنة (2017) تأثير تشويب (Zn) على الخصائص التركيبة لأغشية CdS المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي على ارضيات مختلفة وبدرجة حرارة تحضير C° 80 و ph:10.5 ، وعند دراسة طيف حيود الاشعة السينية وجد ان الاغشية المحضرة على ارضيات زجاجية متعددة التبلور ذات طور سداسي والمستو المفضل للنمو هو (002) ، وأظهرت نتائج فحوصات طبو غرافية السطح MAM وجد أن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي تزداد عند زيادة نسب التشويب .

قام الباحث (2017) بتحضير أغشية Muhammad Amir Hassan) وجماعته [45] سنة (2017) بتحضير أغشية CdS بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي وأغشية 2(S,Se) Cu(In,Ga) المحضر بالرش الحراري لتصنيع خلايا شمسية ، فوجد أن سمك الاغشية يزداد بزيادة زمن الترسيب و عند قياس الاغشية بمجهر القوة الذرية تبين ان خشونة السطح تزداد بزيادة السمك كذلك وجد ان النفاذية تقل عند تلدين اغشية CdS بدرجة حرارة Co 2000 ، وكانت كفاءة تحويل الخلية الشمسية % 9.91 عندما يكون مصدر ايونات الكادميوم هو خلات الكادميوم Cd(CH3COO).

13

الغصل الاول

مهدمة عامة

Aim of the Work

نظراً لأهمية أغشية CdS لما يمتلكه من خصائص فيزيائية كالنفاذية العالية وفجوة الطاقة الممنوعة لذلك يمكن ان يستخدم في التطبيقات الالكتروضوئية الحديثة كالخلايا الشمسية وغيرها .

لذا الهدف من الدراسة الحالية هو تحضير أغشية كبريتيد الكادميوم بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي على قواعد زجاجية ودراسة كل من :

- تأثير السمك على الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية .
- تأثير التشويب بالليثيوم والالمنيوم بنسب (% 7.5 , 5 , 2.5) على الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأغشية كبريتيد الكادميوم.
- تأثير التلدين على الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم.

(12-1) الهدف من البحث

المصل الثاني نظريات ومفاهيم اساسية

نظريات ومغاهيم اساسية

Introduction

يتناول هذا الفصل وصفاً عاماً في الجانب النظري الذي يختص بالخصائص التي تمت دراستها في الدراسة الحالية والمفاهيم الفيزيائية وإيضاح بعض العلاقات والقوانين الرياضية التي من خلالها يمكن حساب ومناقشة النتائج

(2-2) تركيب المواد الصلبة Structure Of Solid Materials

تنقسم المواد الصلبة تبعاً للترتيب الذي تملكه الذرات المكونة لها الى قسمين هما المواد البلورية (Crystalline materials) والمواد العشوائية (Amorphous materials)

Crystalline materials

البلورة هي المادة الصلبة التي تحتوي على ذرات مرتبة على شكل صفوف منتظمة وتمتلك هذه الذرات داخل الشكل الهندسي صفة الترتيب الدوري وتكون المسافة بين الذرات متساوية وانواع البلورات هي :

Single Crystal هي البلورة التي تترتب ذراتها في الفراغ بحيث تشكل نمطاً هندسياً دورياً، اي تمتلك نوعاً من التماثل (Symmetry) و ينتشر هذا النمط ليشغل كل أجزاء المادة . لذلك فإن هذه المواد تمتلك نظام المدى الطويل (Long Range Order) الذي يمكن ان يحقق أقل طاقة داخلية حرة لمنظومة الذرات وكما مبين في الشكل (2-1a) [46] .

Polycrystalline Crystal

هي المواد التي يمتد فيها النمط الهندسي لمدى متوسط فلا يشغل كل أجزاء المادة حيث يتوقف عند حدود داخل المادة مكونة تجمعات متبلورة تدعى الحبيبات(Grains) وتفصل بينها حدود تدعى الحدود الحبيبية (Grain Boundaries) وكل حبيبة تتكون من ألاف من وحدات الخلايا وكما موضح بالشكل (1b-2) [46].

(2-2-2) المواد غير البلورية(العشوائية) Amorphous Materials :- هي المواد التي يغلب على ذراتها ترتيب المدى القصير (Short-Range Order) حيث تتجمع الذرات بشكل عشوائي والترتيب الذري في أي موقع معين منها يبدو مختلفًا عن الترتيب الذري في موقع آخر ، وبذلك لا

(1-2)المقدمة

الغصل الثانى

(2-2-1) المواد البلورية

a. البلورة الاحادية

b. المواد متعددة التبلور

الغصل الثاني

نظريات ومغاهيم اساسية

يمكن إعتبار ترتيبها دوري لوحدة الخلية ، وهذا الترتيب لايعزى إلى وجود تكسر في الأواصر الداخلية بل لأنه خاص بتركيب ذرات المادة[47] والشكل (2-1c) يبين المواد عشوائية التبلور .



الشكل (1-2) ترتيب الذرات للمواد a: احادية التبلور b: متعددة التبلور c: العشوائية [47].

(3-2) التبلور النانوي لأغشية اشباه الموصلات

Nanocrystalline of Semiconductor Films

أشباه الموصلات نانوية التبلور (nanocrystalline) هي مساحات صغيرة ذات قطر (non-1) ومن بين هذه المواد هي أشباه الموصلات التقليدية مثل (CdS, ZnS, PbS, CdSe) حيث أنها تظهر خصائص فيزيائية مختلفة جدا عن تلك التي لوحظت في أشباه موادها الصلبة الكتلوية . وتنشأ هذه الاختلافات أساساً عن تأثير الحصر الكمي. إن انشطار تركيب الحزمة إلى مستويات كمية منفصلة ناتجة عن الحجم المحدود للجسيمات. هذه المواد النانوية لها خصائص فيزيائية مثيرة للاهتمام نظر ا لصغر حجمها، وغالبا ما تكون بلورات مثالية خالية من العيوب أو الاجهاد داخلي [48,49] .

معظم در اسات أشباه الموصلات النانوية تنتمي إلى المجموعة (VI–II)لأنها ذات تركيب بسيط نسبيا ويتم تحضيرها عموما على شكل اغشية رقيقة . ومن بين مركبات (VI–II) هو CdS الذي يعد اكثر
المواد نانوية التبلور (عدد قليل من النانومتر) وتحمل "تأثير الحصر الكمي" حيث تمتلك خصائص فيزيائية تختلف عن حالتها اذا كانت في حالتها الكتلوية اعتماداً على حجم التبلور [50] .

في حالة البلورات النانوية الإلكترونات والفجوات لديها مساحة محدودة للتحرك وحركة تكون ضمن قيم محددة من الطاقة، ونتيجة لذلك يتم تقسيم حزمة التوصيل وحزمة التكافؤ إلى حالات منفصلة مع تباعد الطاقة بالنسبة إلى حافة الحزمة، التي تتناسب عكسيا تقريبا مع مربع نصف قطر الجسيمات مما يؤدي إلى اتساع فجوة الطاقة وبذلك تختلف عن حالتها الكتلوية كما في الشكل (2-2). ويلاحظ ذلك عادة من خلال الإزاحة الزرقاء في طيف الامتصاص البصري [51].



شكل (2-2) علاقة فجوة الطاقة مع قطر حجم التبلور [52].

Quantum confinement

إن مستويات الطاقة الإلكترونية تصبح منفصلة على مستوى النانو أي أن هناك كثافة محدودة من المستويات بسبب حصر وظيفة الموجة الإلكترونية على الأبعاد الفيزيائية للجسيمات كما في الشكل (3-2) حيث نلاحظ اتساع فجوة الطاقة كلما اقتربنا من الابعاد النانوية وهذا ما يسمى ظاهرة "الحصر الكمي" [53]. وهو عندما يكون حجم المواد على مقياس نانو (D<10nm)، حيث ان خصائصها البصرية والإلكترونية تختلف بشكل ملحوظ عن المواد الكتلوية. عندما البعد المقيد يكون حبم معار من الابعاد منانو (D<10nm)، حيث المعتويات بسبب حصر والإلكترونية تحمي المواد على مقياس نانو (D<10nm)، حيث ان حيث ان معاور المعاد المواد على مقياس نانو (D<10nm)، حيث ان حصائصها البصرية والإلكترونية تختلف بشكل ملحوظ عن المواد الكتلوية. عندما البعد المقيد يكون حجم المواد أو من المواد الكتلوية. عندما يكون كبيراً معار معار بالمقارنة مع الطول الموجي للجسيمات يصبح طيف الطاقة منفصلاً وعندما يكون كبيراً مقارنةً مع الطول الموجي للجسيمات تتصرف كجسيم حر[54] .

(4-2) الحصر الكمي

الغصل الثاني

شكل (2-3) تدرج مستويات الطاقة بين مقدار فجوة الطاقة من الجزيء الى المواد الكتلوية [55].

Structure properties

تعد الخصائص التركيبية وسيلة مهمة لدراسة التركيب البلوري للأغشية ويتم من خلال أستخدام حيود الاشعة السينية

(2-5-1) حيود الاشعة السينية X - ray diffraction

يستخدم تحليل حيود الأشعة السينية لمعرفة طبيعة التركيب البلوري والاطوار البلورية الرئيسة وكذلك معرفة الاتجاه السائد للأغشية المحضرة عند ظروف معينة، إذ يعتمد المبدأ العام للحيود على ظاهرة التداخل الذي يحدث عندما تتشتت حركة موجة ما عند عدد من مراكز الذرات ونتيجة لذلك يحدث أما تداخلاً بناءا (Constructive Interference) أو تداخلا اتلافياً (Destructive Interference) . العالم الإنكليزي (براك) فرض إنموذج بسيط للتركيب البلوري يمكن بوساطتـه معرفة اتجاه حيود الأشـعة السينية من البلورة بعد سقوطها عمليا، وينص هذا الأنموذج على أن المستويات المختلفة التي تتكون من ذرات البلورة يمكنها أن تعكس الأشعة السينية . [56,57]

نظريات ومغاهيم اساسية



(2-2) الخصائص التركيبية

الغصل الثاني

نظريات ومغاهيم اساسية

 $n \lambda = 2 d \sin \theta$

حيث ان d : المسافة بين مستويين ذريين متعاقبين . θ: زاوية الحيود.

(1-2)

عدد صحيح
$$(1,2,3,4,...)$$
 عدد صحيح λ : الطول الموجي للأشعة السينية.

حيث ان انعكاس براك يحدث فقط عندما يكون الطول الموجي للأشعة الساقطة الذي من خلاله يمكن الحصول على انعكاس من مستوى له احداثيات (*hkl*) أصغر اومساوي لضعف المسافة البينية بين مستويين بلوريين متعاقبين، وكما موضح بالشكل (2-4) ولذلك لا يمكن استخدام الضوء المرئي لدراسة البنية البلورية، اي ان شرط براك للانعكاس هو $\lambda \ge 2d_{hkl}$.



شكل (2-4) حيود براك والمستويات البلورية [59] .

(2-5-2) المعلمات التركيبية

1۔ ثوابت الشبيكة

lattice constants

structure parameters

إن معرفة العوامل التركيبية الخاصة بأي مادة والتي تعتمد على طيف حيود الأشعة السينية يعد أمراً مهماً في تفسير الكثير من الخصائص الفيزيائية للمادة ، ففي حالة التركيب المكعب (Cubic) والذي يمثل الطور السائد لتركيب (Cubic) الموضح في الشكل (2-1) فأن (a,b,c) تمثل ثوابت الشبيكة وأن=a=b وبذلك يمكن حساب ثابت الشبيكة (a) باستخدام المعادلة الآتية [60].

الغصل الثاني

$$d_{hkl} = \frac{a}{(h^2 + k^2 + l^2)^{1/2}} \qquad \dots \qquad (2-2)$$

Texture Coefficient

2 -عامل التشكيل (Tc)

يستخدم عامل التشكيل لوصف الاتجاه السائد للمستوي في الاغشية الرقيقة ويمكن حسابه من خلال العلاقة الآتية [28]:

$$Tc = \frac{I(hkl)/I_{o}(hkl)}{N^{-1}\sum I(hkl)/I_{o}(hkl)} \qquad \dots \quad (3-2)$$

حيث ان (N) هي عدد القمم الظاهرة في حيود الاشعة السينية (XRD). الشدة المقاسة للمستوي (hkl). الشدة القياسية للمستوي (hkl) في بطاقة (ICDD) .

3- معدل الحجم الحبيبي 3-Average Grain Size

يتم حساب معدل حجم الحبيبات باستعمال معادلة شرر (Scherer's Formula) [61] .

$$D_{av} = \frac{k\lambda}{\beta \cos\theta} \qquad \dots (4-2)$$

اذ ان :K: عامل الشكل shape factor ويساوي K:

الطول الموجي للأشعة السينية المستخدمة . heta : زاوية حيود براك. Λ

β :العرض الكامل عند منتصف القمة (FWHM) (FWHM)) بوحدة (rad).

4- كثافة الانخلاعات وعدد البلورات

Dislocation density and number of grains

كثافة الانخلاعات هي عدد خطوط الانخلاعات لوحدة المساحة في تلك البلورة، وهي النسبة بين الطول الكلي لجميع خطوط الانخلاع وحجم البلورة، ويمكن حساب كثافة الانخلاع باستخدام علاقة Williamson and Smallmans [62].

$$\delta = \frac{1}{D_{av}^2} \qquad ... \qquad (5-2)$$

كذلك يمكن حساب عدد البلورات لوحدة المساحة (No) من العلاقة الاتية [62] .

 $N_{\circ} = \frac{t}{\mathcal{D}_{av}^3} \qquad \qquad \dots \qquad (6-2)$

حيث أن t : السمك .

(2-5-2) المجهر الالكتروني الماسح

5 - تشوه البلورة (المطاوعة الميكروية) (Crystal distortion (Micro strain

إنَّ التغير الذي يحصل في الفسحة بين السطوح الذرية يشير إلى وجود تشوه في البلورة وهذا يعني ان (b) قد لا تكون متساوية في كل جزء من أجزاء البلورة فيؤدي ذلك الى أن يعكس كل جزء من اجزاء البلورة فيؤدي ذلك الى أن يعكس كل جزء من اجزاء البلورة المعة (*x-ray*) بزاويه تختلف عن الجزء الآخر ومن ثم فان الإنعكاس الناتج عن الأجزاء المختلفة في البلورة المعة (*x-ray*) بزاويه تختلف عن الجزء الآخر ومن ثم فان الإنعكاس الناتج عن الأجزاء المختلفة في البلورة المعة (*x-ray*) بزاويه تختلف عن الجزء الآخر ومن ثم فان الإنعكاس الناتج عن الأجزاء المختلفة في البلورة المعة (*x-ray*) بزاويه تختلف من الجزاء المختلفة في البلورة المعة (*x-ray*) بزاويه تختلف عن الجزء الآخر ومن ثم فان الإنعكاس الناتج عن الأجزاء المختلفة في البلورة الميكروية دوما الأعشية اذ من المحالومة الميكروية خلال الأعشية اذ الأجزاء المحالومة الميكروية (*S*) الشبيكة ويمكن حساب المطاومة الميكروية (*S*) من المعادلة الاتية [63]:

$$S = \frac{\beta \cos\theta}{4} \qquad \qquad \dots \qquad (7-2)$$

Scanning Electron Microscope

المجهر الالكتروني الماسح يعد من أهم التقنيات العلمية في العصر الحديث، حيث يمكن من خلاله تكوين صور ثلاثية الأبعاد ومكبرة بدرجة كبيرة تفوق تلك الناتجة عن المجاهر الضوئية، حيث يتم تسليط حزمة الكترونات بواسطة المدفع الالكتروني ويتم توجيهها على العينة ومسح سطحها ومن ثم تظهر نسخة طبق الأصل على الشاشة، وبدلاً من أن يقوم الشعاع الالكتروني بمسح سطح العينة في بعد واحد فأنه يقوم بمسح ثلاثي الأبعاد للمادة ليكوّن صورة ثلاثية الأبعاد بكل التفاصيل الموجودة من تجاويف وخدوش وشقوق، ويتم ذلك عندما يمسح الشعاع الإلكتروني سطح العينة الذي يتم التحكم بحركته من خلال المجال المغناطيسي ، فإنه يتفاعل مع سطح العينة وينتزع الالكترونات من السطح بشكل محدد، إذ ان هذه الالكترونات المنتزعة يتم كشفها عن طريق كاشف وذلك بواسطة جذب الالكترونات المتشتتة وبالاعتماد على عدد الإلكترونات التي تصل للكاشف، فإنها تسجل درجة من مستوى الإضاءة على الشاشة، وتستعمل مجسات إضافية يتم الكشف الالكترونات المتشتتة وبالاعتماد على عدد الإلكترونات التي تصل للكاشف فإنها المنبعثة من العينة بالانعكاس عن سطح العينة (backscattered) وكذلك الأشعة السينية المنبعثة من العينة إ64] .

Atomic Force Microscopy

(2-5-4) مجهر القوى الذرية

إخترع ميكروسكوب القوة الذرية (AFM) العالمَين Quate و Gerber وتوفر أول جهاز استخدام في المختبرات العلمية في عام 1986. ويعد هذا الميكروسكوب الأكثر شهرة كأداة تكبير وقياس وتحريك على المستوى النانوي، يتكون جهاز مجهر القوى الذرية (AFM) من ذراع (Cantilever) ويتميز بمرونة عالية والمجس (Probe) وهو الجزء المتصل بطرف الذراع المكوّن من رأس حاد يدعى (Tip) وهو الجزء الادق المسؤول عن فحص أسطح العينات، وكذلك يحتوى على وحدة المسح ثلاثية الاتجاهات (Piezo – electric xyz scan driver) وتعمل هذه الوحدة على تحريك سطح العينة تحت المجس في جميع الاتجاهات مما يتيح للمجس من مسح سطح العينة في جميع الاتجاهات، فعندما يقترب راس المجس من سطح العينة تنشا قوة تؤدي إلى إنحراف الذارع ويخضع هذا الانحراف لقانون (هوك)، وقد تكون القوة المتبادلة من نوع قوة فاندر فألز أو غيرها من أنواع القوى فتتغير قـوة التفاعل بين سطح العينة وراس المجس تبعاً لنوعية مكونات سطح العينة وخصائص سطحها (Surface Topography) والتي بدورها تغير من إنحراف الذراع، ان هذا التغير يتم رصده بواسطة شعاع ليزر دقيق ينعكس من قمة الذراع وذلك بتسجيل التغير في حركة هذا الشعاع عن طريق كاشف ضوئي حساس جداً (-Sensitive Photo detector) ويتم معالجة هذه الإشارات المرسلة من الكاشف الضوئي في وحدة المعالجة المركزية لتكوين صور ثلاثية الابعاد لسطح العينة. وكذلك يعطى معلومات في غاية الدقة عن خشونة السطح ومعدلها (RMS) بالإضافة إلى التحليلات الإحصائية المهمة كما في الشكل (2-5) [65] .

الغصل الثاني





شكل (2-5) التركيب البسيط لمجهر القوة الذرية AFM [65] .

(2-6) الخصائص البصرية

Optical Properties

تعد دراسة الخصائص البصرية لأشباه الموصلات لها أهمية كبيرة لأنها تعطي الكثير من المعلومات عن نوع الانتقالات الالكترونية التي تحدث في المادة، بالإضافة الى تركيب حزم الطاقة، وكذلك تصف الخصائص التي تحدد تفاعل الضوء مع المادة .

عندما تكون طاقة الإشعاع الممتص من قبل شبه الموصل أكبر أو مساوية تقريبا إلى قيمة فجوة الطاقة (Eg) فأنها تتسبب في انتقال الإلكترون من حزمة التكافؤ المملؤة بالإلكترونات إلى حزمة التوصيل الخالية من الإلكترونات ، حيث تعرف منطقة طيف الأشعة الساقطة والتي تبدأ فيها الإلكترونات بالانتقال بحافة الامتصاص (Absorption Edge)، وان المقدار في الفرق بين طاقة ادنى نقطة في حزمة التوصيل (C.B) وطاقة أعلى نقطة في حزمة التكافؤ (V.B) يطلق عليه بفجوة الطاقة البصرية (Eg) [66].

(7-2) الانتقالات الإلكترونية

(2-7-1) الانتقال المباشر

direct Transitions

Electronic Transitions

يكون هذا الانتقال عندما ينتقل الالكترون من قمة حزمة التكافؤ إلى قعر حزمة التوصيل لنفس النقطة في فضاء متجه الموجة k وبشكل عمودي حيث ($\Delta k = 0$) وبصورة مباشرة عندما يمتص إلكترون في حزمة التكافؤ المملؤة بالإلكترونات فوتونا طاقته اكبر أو تساوي طاقة الفجوة ($E_g \le h \sigma$) لينتقل الى مكان في حزمة التوصيل حيث يتحقق فيه قانون حفظ الطاقة والزخم ، وتسمى المواد التي يحدث فيها تلك الأنتقالات بأشباه الموصلات المباشرة، وتكون الانتقالات الالكترونية المباشرة على نوعين [1] :

Direct allowed transition

يحدث هذا النوع من الانتقالات عندما ينتقل الإلكترون بصورة مباشرة من أعلى قمة حزمة التكافؤ (Δk = 0) الى أدنى قعر حزمة التوصيل (Δk = 0)، وعند نفس قيمة المتجه الموجي أي أن(Δk = 0) [1] كما في الشكل (6a-2).

Direct forbidden transition

عند حدوث الانتقال بين النقاط المجاورة لأعلى وأوطأ نقطة وبشكل مباشر أيضا وعند نفس قيمة المتجه الموجي أي أن ($\Delta k = 0$)، وحسب المعادلة (2-9) يحدد نوع الانتقال، فإذا كان (r=1/2) يكون الانتقال مباشراً مسموحاً أما إذا كان (r=3/2) فان الانتقال يكون مباشراً ممنوعاً، كما موضح في الشكل (2-66)، وإن معامل الامتصاص للانتقالات المباشرة يعطى بالعلاقة الآتية [67].

- $\alpha h \, v = \hat{A} \left(h \, v E_g \right)^r \qquad \dots \qquad (8-2)$
 - α: معامل الامتصاص (¹⁻cm) ، h*v* : طاقة الفوتون الممتص (eV) . : ثابت يعتمد على خواص كل من حزمتي التكافؤ والتوصيل . E_g : فجوة الطاقة الممنوعة (eV) . ، r : معامل أسي مقدارة يعتمد على طبيعة الانتقال .

Indirect Transitions

تكون هذه الانتقالات الالكترونية عندما ينتقل الكترون من قمة حزمة التكافؤ إلى قعر حزمة التوصيل بصورة غير عمودية ولا تتساوى قيمة متجه الموجة للإلكترون أي ان (Δk≠0) و تحدث هذه الانتقالات بمساعدة الفونون من اجل حفظ الزخم (Conservation of momentum) الناتج عن تغير متجه الموجة(Wave vector) للإلكترون، تكون الانتقالات غير المباشرة على نوعين [1] :

1- الانتقال غير المباشر المسموح
2- الانتقال غير المباشر المسموح
يحدث هذا الانتقال عندما ينتقل الالكترون من أعلى نقطة في حزمة التكافؤ الى أوطأ نقطة من
حزمة التوصيل وفي مناطق مختلفة لفضاء (k) كما في الشكل (2-66).

1 - الانتقال المباشر المسموح

2- الانتقال المباشر الممنوع

(2-7-2) الانتقال الغير مباشر

اذ ان :

2- الانتقال غير المباشر الممنوع
8- الانتقال غير المباشر الممنوع
9- الانتقالات التي تحدث بين نقاط مجاورة لأعلى وأوطأ نقطة في حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل ولمناطق مختلفة لفضاء (k) [62] ، وكما موضح بالشكل(2-6d) .
9- وان معامل الامتصاص للأنتقال غير المباشر بمصاحبة فونون ممتص أو منبعث يعطى بالمعادلة الآتية [67].

$$(\alpha h \boldsymbol{v}) = \hat{A} \left(h \boldsymbol{v} \cdot E_{g} \pm E_{p} \right)^{r} \qquad \dots \qquad (9-2)$$

حيث ان : r: ثابت يعتمد على طبيعة الانتقال يكون (2) للانتقال الغير مباشر المسموح ، ويكون (3) للانتقال الغير مباشر الممنوع .

E_p : طاقة الفونون ، الاشارة (+) تعنى انبعاث الفونون ، والاشارة (–) هي امتصاص للفونون .



شكل(2-6) انواع الانتقالات الالكترونية (a) انتقال مباشر مسموح، (b) انتقال مباشر ممنوع (c) انتقال غير مباشر ممنوع (c) .

Optical Transmittance

(8-2) النفاذية البصرية

الغصل الثاني

النفاذية (T)هي النسبة بين شدة الإشعاع النافذ (I_T) من الغشاء الرقيق الى شدة الإشعاع الساقط (I_o) ويعبر عنها بالعلاقة الآتية [69] :

$$T = \frac{I_T}{I_0} \qquad \dots \qquad (10-2)$$

ان مادة شبه الموصل عندما تتعرض إلى حزمة من الأشعة فان جزءاً من هذه الاشعة الساقطة سوف ينفذ، وأن الشدة النافذة للأشعة تعتمد على طاقة الفوتونات الساقطة وخصائص مادة شبه الموصل وكذلك تعتمد على سُمك الأغشية ودرجة حرارة التحضير و نسبة الإضافة من الشوائب .

Absorbance Optical

أن النسبة بين شدة الإشعاع الممتص من قبل الغشاء (I_A) إلى شدة الإشعاع الساقط علية (I_o) تعرف بالامتصاصية (A)، اذ تمثل النقص الحاصل في طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي عند دخوله الى الغشاء، تعتمد الامتصاصية على طبيعة وسمك شبه الموصل، و يعبر عنها بالعلاقة الآتية [70] :

$$A = \frac{I_A}{I_\circ} \qquad \qquad \dots \qquad (11-2)$$

أن النسبة بين شدة الشعاع الساقط الى شدة الشعاع المنعكس عند الحد الفاصل بين وسطين تعرف بالانعكاسية (R)، يمكن حساب الانعكاسية حسب قانون حفظ الطاقة ومن خلال معرفة قيمة كل من النفاذية (T) والامتصاصية (A) [70] :

Optical Constants

Optical Reflectance

يوجد الكثير من الطرق لإيجاد وحساب الثوابت البصرية من طيفي الامتصاصية والنفاذية والتي تشمل معامل الامتصاص ،معامل الانكسار ، معامل الخمود وفجوة الطاقة البصرية.

(9-2) الامتصاصية البصرية

(10-2) الانعكاسية البصرية

(11-2) الثوابت البصرية

R+T+A=1 ... (12-2)

أن نسبة النقص الحاصل في فيض طاقة الاشعاع الساقط بالنسبة إلى وحدة المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط يعرف بمعامل الامتصاص(α) [71] ، ويعتمد معامل الامتصاص (α) على خصائص شبه الموصل من حيث فجوة الطاقة ونوع الانتقالات الالكترونية التي تحدث بين حزم الطاقة وعلى طاقة الفوتونات الساقطة (hv) من خلال العلاقة الآتية [72]:

$$\mathbf{E} = \mathbf{h}\boldsymbol{v} \qquad \dots \qquad (13-2)$$

عندما تكون طاقة الفوتون الساقط أقــل من قيمة فجوة الطاقـة فأن الفوتون سوف ينفذ ، ويعبر عن النفاذية هنا بالعلاقة الآتيـة [72] :

$$T = (1 - R)^2 e^{-\alpha t} \qquad \dots \qquad (14 - 2)$$

(t) سمك الغشاء

ومن خلال علاقة النفاذية مع الامتصاصية [73] :

 $A = Log \frac{1}{T}$... (15-2) T = e^{-2.303A} ... (16-2)

e^{-2.503A} (16 – 2) ومن خلال تساوى المعادلتين (2-14) و (2-16) نحصل على :

 $e^{-2.303A} = (1-R)^2 e^{-\alpha t}$... (17-2)

ومنها نحصل على :

 $A = \frac{1}{2.303} (\alpha t - 2 \ln (1 - R)) \dots (18 - 2)$ وللتخلص من الحد ((1 - R)) (2 Ln (1 - R)) الذي يمثل الأنعكاسية للغشاء .
و عند تحضير غشائين من المادة نفسها فان الانعكاسية تكون متساوية في الظروف نفسها .
فإذا كان سُمك الغشاء الأول t_1 وأنعكاسيته R_1

$$A_1 = \frac{1}{2.303} (\alpha \mathbf{t}_1 - 2 \ln (1 - R_1)) \quad \dots \quad (19 - 2)$$

الغصل الثاني

(1-11-2) معامل الامتصاص

أذا كان سُمك الغشاء الأول t_2 وأنعكاسيته R_2 فأن امتصاصيته A_2 :

$$A_2 = \frac{1}{2.303} (\alpha \mathbf{t}_2 - 2 \operatorname{Ln} (1 - R_2)) \quad \dots \quad (20 - 2)$$

وبطرح المعادلة (2-19) من (2-2) في حالة R صغيرة جدا نحصل على معامل الامتصاص
$$\alpha(\Delta t) = 2.303 \Delta A$$
 ... (21-2)

 $\alpha = 2.303 \frac{A}{t}$ (22 - 2)...

حيث (t) سمك الغشاء بوحدة (cm) ، (A) الامتصاصية

تدعى النسبة بين سرعة الضوء(c) في الفراغ الى سرعته في وسط ما (v) بمعامل الانكسار (n)، ويعتمد معامل الانكسار على نوع المادة وعلى تركيبها البلوري ويعبّر عنه بالمعادلة الأتية [74] :

$$n = \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 - \left(k_{\circ}^2 + 1 \right) \right]^{1/2} + \frac{1+R}{1-R} \qquad \dots \quad (23-2)$$

Extinction Coefficient

Refractive Index

معامل الخمود ko هو كمية الطاقة الممتصنة في الغشاء الرقيق، ويمثل كمية ما تمتصه الكترونات المادة من طاقة الفوتونات الساقطة، بمعنى اخر انه يمثل الخمود او التوهين الحاصل في الموجه الكهر ومغناطيسية في داخل المادة ، ويعبّر عنه بالعلاقة التالية [75] :

$$k_{0} = \alpha \lambda / 4\pi \qquad \dots \qquad (24-2)$$

ويمكن كتابة المعادلة كما يلى [72] :

Optical Energy Gap

تعد فجوة الطاقة من الثوابت البصرية المهمة ، وتعد دالة لدرجة الحرارة اذ تتغير قيمتها تغيراً بسيطاً مع تغير درجة الحرارة (T) حيث تزداد فجوة الطاقة في بعض أشباه الموصلات في حين تقل في بعضها الآخر، ان فجوة الطاقة لشبه الموصل النقى لا تكون خالية تماما حيث توجد فيها مستويات موضعية ناتجة من العيوب التركيبية . ويمكن حساب فجوة الطاقة للانتقالات الالكترونية المباشرة المسموحة من خلال رسم العلاقة البيانية بين (hv) و $(ahv)^2$ وحسب المعادلة (2-9) بواسطة مد أفضل خط مستقيم يكون امتدادهُ قاطعا لمحور طاقة الفوتون (hv). إذ يتم تحديد قيمة فجوة الطاقة من $(\alpha h v)^2 = 0$ خلال نقطة التقاطع مع محور x التي يكون عندها $(\alpha h v)^2 = 0$.

Electrical conductivity

تعرف التوصيلية الكهر بائية σ بأنها عامل التناسب بين كثافة التيار الكهريائي (1) والمجال الكهربائي E [77].

$$J = \sigma E \qquad \qquad \dots \qquad (25-2)$$

تعد اكثر اشباه الموصلات هي مواد متعددة التبلور تلعب فيها الحدود الحبيبية دورا مهما في تحديد الخصائص الفيزيائية لان هذه الحدود تعتبر عيوباً بلورية ينشأ من خلالها حاجز الجهد الالكتروسناتيكي على جانبي الحبيبات الذي يعمل على إعاقـة سريان أغلبية حاملات الشحنـة كما تسبب هذه العيوب تكوين مستويات طاقة مسموحة تقع ضمن فجوة الطاقة الممنوعة ويتم إيجاد المقاومية من خلال العلاقة الاتية [18]:

ρ =
$$\frac{R.b.t}{L}$$
 (26 – 2)
R: مقاومية الغشاء ، b : عرض القطب (cm) ، t: سمك الغشاء (cm) ، l: المسافة بين قطبي
الالمنيوم (cm) .

ويتم حساب التوصيلية المستمرة من حساب مقلوب قيمة المقاومة النوعية [18]:

$$\sigma = \frac{1}{
ho}$$
 ... $\sigma = \frac{1}{
ho}$

ومن رسم العلاقة البيانية بين $ln\sigma$ ومقلوب درجة الحرارة المطلقة، حيث أنها تساوي ميل المستقيم من الرسم البياني مضروباً بثابت بولتزمان (k_B) بوحدات الالكترون فولت (eV) ويتم حساب طاقة التنشيط وفقا للمعادلة الاتبة [1] :

$$\sigma = \sigma_0 e^{-Ea/k_{\beta}T} \qquad \dots \qquad (28-2)$$

حيث ان: _•σ: اقل توصيلية معدنية ، k_β : يمثل ثابت بولتزمان بوحدات (eV) ، Ea : طاقمة التنشيط التي تساوى قوة أصرة (الكترون – ذرة) حيث تعرف بأنها الشغل اللازم لتحرير الالكترون من ذربته في المادة

(4-11-2) فجوة الطاقة البصرية

(12-2) التوصيلية الكهربائية

الغطل الثانى

الغصل الثاني

نظريات ومغاهيم اساسية

إن المعادلة أعلاه تمثل التوصيلية الكهربائية المستمرة التي تحصل في الدرجات الحرارية العالية وتتم من خلال الإثارة الحرارية (Thermal Excitation) لحاملات الشحنة، أما عند الدرجات الحرارية الأوطأ فإن التوصيلية تتم بسبب اثارة حاملات الشحنة الى المستويات الموضعية بالإضافة الحرارية الأوطأ فإن التوصيلية تتم بسبب اثارة حاملات الشحنة الى المستويات الموضعية بالإضافة الى عملية التناط (Hopping) بمساعدة الفونونات [78] وعند تسليط مجال كهربائي على شبه الموصل فان نوعين من حاملات الشحنة تشارك في عملية التوصيلية والفجوات المعاد الموصيلة المستمرة الموصل في المستويات الموضعية بالإضافة الى المعاد الموضعية بالإضافة الى عملية التناط (Hopping) بمساعدة الفونونات [78] وعند تسليط مجال كهربائي على شبه والموصل فان نوعين من حاملات الشحنة تشارك في عملية التوصيل الكهربائي هما الإلكترونات الموصل فان نوعين من حاملات الشحنة الموصل الآتية [79] وبأخذ اللوغاريتم الطبيعي لطرفي المعادلة (29-2) نحصل على:

$$Ln\sigma = ln\sigma_{\circ} - \frac{E_a}{k_{\beta}T} \qquad \dots \qquad (29-2)$$

بذلك تكون طاقة التنشيط تساوي ميل المستقيم للعلاقة البيانية بين lno ومقلوب درجة الحرارة 1000/7 مضروباً بثابت بولتزمان بوحدات (eV) .

إذا كان شبه الموصل يحتوي على شوائب مانحة أو قابلة فليس هنالك إلكترون أو فجوة (Hole) حرة تماما في درجة (OK) وعند زيادة درجة الحرارة فإن إلكترونات الشوائب تكون أول من يفلت من الأواصر التساهمية لأن طاقة تنشيط إلكترونات ذرات الشوائب أقل من طاقة تنشيط إلكترونات ذرات شبه الموصل ، وذلك يؤدي الى تأين ذرات الشوائب [10] . وبزيادة درجة الحرارة أكثر فأن التوصيلية الذاتية ستلعب دورا مهما حيث أن إلكترونات حزمة التكافؤ ستأخذ كمية كافية من الطاقة الحرارية لعبور فجوة الطاقة إذ أن مراكز الشوائب ستنفذ أي تستطيع أن تزود حزمة التوصيل بالإلكترونات [30] . كذلك يوجد عامل مهم في تحديد تحركية حاملات الشحنة في الاغشية متعددة التبلور وهو وجود الحبيبات البلورية إذ يؤثر حجم الحبيبات وطبيعة حواجز الجهد التي تتولد عند حدود الحبيبات على حركة حاملات الشحنة [30] .

Hall Effect

(13-2) تأثير هول

إن مرور نيار في موصل يمكن أن يعزى إلى حاملات شحنة موجبة تتحرك في اتجاه التيار أو سالبة تتحرك في عكس اتجاه التيار أو كلاهما معاً. ولتحديد حاملات الشحنة قام العالم ادوين هول (Edwin Hall) في العام 1879 بتصميم تجربة عملية لتحديد نوع حاملات الشحنة في مادة الموصل وكذلك تمكن من ايجاد عدد حاملات الشحنة لكل وحدة حجوم. كما توفر هذه التجربة وسيلة لقياس شدة المجال المغناطيسي. وتقوم فكرة تجربة هول كالتالي: عند وضع قطعة من مادة موصلة في شكل شريحة يمر بها تيار كهربائي في اتجاه محور x، في مجال مغناطيسي (B) خارجي عمودي على مستوى الشريحة على المحور z مستوى الشريحة على المحور z فرق جهد يدعى بفرق جهد هول (Voltage Hall) [82].



شكل (2-7) ظاهرة تأثير هول لشبه الموصل من نوع (n-type) [83] .

يمكن إيجاد معامل هول (R_H) من العلاقة [21] :

$$R_H = \frac{V_H}{I} \cdot \frac{t}{B}$$
 ... (30 - 2)

حيث ان [: التيار المار في الشريحة، t: سمك العينة ، B: شدة المجال المغناطيسي. فإذا كان ميل العلاقة أعلاه سالباً، فإن حوامل الشحنات ذات إشارة سالبة وإن شبه الموصل يحتوي على فيض من الإلكترونات وهو من النوع السالب (n-type)، أما إذا كان الميل موجباً فيدل ذلك على أن حوامل الشحنات ذات شحنة موجبة وان شبه الموصل يحتوي على فيض من الفجوات وهو من النوع الموجب (p-type).

ويمكن حساب تركيز حاملات الشحنة بالعلاقتين [18] :

- $R_H = \frac{-1}{ne}$... (31-2)
- $R_H = \frac{1}{np}$... (32 2)

حيث ان : n: تركيز حوامل الشحنات السالبة (الإلكترونات) (P ، (cm⁻³) ، P: تركيز حوامل الشحنات الموجبة (الفجوات) (cm⁻³) ، e: شحنة الإلكترون .

(14-2) التلدين

التلدين هو زيادة درجة حرارة العينة تحت درجة انصهار ها مع استمرارية الثبوت عند درجة حرارة معينة للوصول للتجانس الحراري عند جميع اجزاء العينة حيث يعاد ترتيب مواقع الذرات مما يطرأ عادةَ تغير في التركيب البلوري للمادة وكذلك تغير كثافة الانخلاعات ، وقد تجري عملية التلدين في الفراغ أو بوجود غاز معين أو بالهواء وقد تتم بأفران خاصة او باستخدام تقنية الليزر، وقد تسبب نقصان في قيمة فجوة الطاقة للغشاء نتيجةً لتكوين مستويات موضعية داخل فجوة الطاقة مما يقد مما يقل من مقاومية النزران خاصة او باستخدام تقنية الليزر، وقد تسبب نقصان في قيمة فجوة الطاقة للغشاء نتيجةً لتكوين مستويات موضعية داخل فجوة الطاقة مما يقل من مقاومية الغشاء وزيادة المقاومية الكهربائية أو قد تسبب عملية التلدين زيادة في قيمة فجوة الطاقة وريادة التوصيلية الكهربائية أو قد تسبب عملية التلدين زيادة في قيمة فجوة الطاقة وريادة المقاومية نتيجة نقصان المستويات الموضعية داخل فجوة الطاقة وبالتالي تؤدي الى زيادة المقاومية التلدين المستويات الموضعية داخل فجوة الطاقة وبالتالي نقصان الموضعية الكهربائية أو قد تسبب عملية التلدين زيادة في قيمة فجوة الحالية الكهربائية أو قد تسبب عملية التلدين زيادة في قيمة فجوة الطاقة وبالتالي نقصان الموضعية الغشاء وريادة المقاومية نتيجة نتيجة نقصان المستويات الموضعية داخل فجوة الطاقة وبالتالي نقصان الموضعية الكهربائية أله عملية الكهربائية أو قد تسبب عملية التلدين زيادة في قيمة فيوة أو واللالة وبالتالي نقصان التوصيلية الكهربائية، نقسم عملية التلدين الى [84,85]:

1- التلدين الحراري السريع

في هذا النوع من التلدين تتعرض المادة الى حرارة لمدة زمنية تقريبا (100 sec) .

2- التلدين الحراري التقليدي

وهو التلدين الذي يستخدم بالفرن الحراري لمعالجة العيوب البلورية ويختلف عن التلدين الحراري السريع من حيث زمن التلدين، تتم عملية التلدين عن طريق الطور الصلب وان أقل مدة زمنية لازمة لعملية التلدين الحراري هو من (min) .

Annealing



الغصل الثالث

(1-3) المقدمة

Introduction

الجزء العملي

يتضمن هذا الفصل وصفاً تفصيلياً لمنظومة الترسيب بالحمام الكيميائي المستخدمة، والخطوات المعتمدة لتحضير اغشية (CdS) وبسمك nm (20± 150,300,450) والمشوب بالألمنيوم والليثيوم وبنسب حجمية %(2.5,5,7.5) وبسمك nm (20±450)، وتلدين الأغشية المحضرة بدرجة حرارة (300 °C)، والتعرف على الاجهزة المستخدمة في اجراء الفحوصات التركيبية والبصرية والكهربائية وفيما يلي مخطط يبين الخطوات المتبعة في الجزء العملي :



مخطط (1-3) الخطوات المتبعة في الجزء العملي

33

الجزء العملي

(2-3) منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي Chemical bath deposition system

تتكون منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي من أدوات بسيطة ومتوفرة محليا، ويمكن من خلالها ترسيب اغشية رقيقة وعلى أرضيات مختلفة، والشكل (3-2) يبين الاجزاء البسيطة للمنظومة وهي تتألف من :

1- الخلاط المغناطيسي مع مصدر للحرارة (magnetic stirrer hot plate) .

2- حامل مع ماسك .

8- pH meter : يستخدم لقياس الحامضية والقاعدية للمحلول المُحضّر ،مجهز من شركة (HANNA) نوع (BHep, RI02895,Romania) .

4- مقياس حرارة (Thermometer) يستخدم لقياس درجة حرارة المحلول.

5- بيكرات (Beakers) مختلفة في الاحجام .



شكل (2-3) منظومة الترسيب بالحمام الكيميائي .

الغصل الثالثم

(3-3) ترسيب الأغشية الرقيقة

(1-3-3) تنظيف الارضيات

Cleaning substrates

Solutions preparation

1- تحضير محاليل اغشية CdS النقية Preparation pure CdS films : لتحضير محاليل أغشية كبريتيد الكادميوم النقية تم استخدام خلات الكادميوم المائية Cd(CH₃COO)₂.2H₂O كمصدر لأيونات الكادميوم مجهزة من شركة (CDH-India)، وهو عبارة عن مسحوق أبيض سريع الذوبان في الماء ذات وزن جزيئي (266.53g/mol) ونقاوة %98.0، حيث تم تحضيره في درجة حرارة الغرفة وبتركيز (0.025M) ومن خلال معادلة (3-1) [86] .

الارضيات المستخدمة في هذا البحث من الزجاج أبعادها تقريبا cm (0.1×2.54×2.52) وتم تهيئة

هذه الارضيات وذلك بتنظيفها جيداً بالماء ومسحوق الغسيل للتخلص من الاتربة والعوالق الكبيرة

،بعد ذلك تغمر بالماء المقطر وتوضع في جهاز الموجات فوق الصوتية لمدة (10 min) ،وبعد ذلك

توضع في محلول الاسيتون ذو نقاوة (%99.5) ووضعه في جهاز الموجات فوق الصوتية لمدة 10)

(min ،ثم توضع الأرضيات في الماء المقطر الخالي من الأيونات لمدة (10 min) ،ثم تجفف بفرن

حراري بدرجة $^{\circ}$ C لمدة (15 min) ومن ثم حساب وزنها بواسطة ميزان رقمي ذي حساسية 4 -10

$$W_t = \frac{M_{Wt} * V * M_{\circ}}{1000}$$
(1-3)

(M) التركيز المولاري . (W_t) الوزن المراد إذابته. . الوزن الجزيئى . (M_{wt}) (M) حجم الماء المقطر بوحدة (ml).

حيث تم إذابة (1.33 g) في (200 ml) من الماء المقطر الخالي من الايونات ووضعه على الخلاط المغناطيسي لمدة (10 min) وذلك للحصول على الإذابة التامة ويصبح محلول رائق عديم اللون ، بعد ذلك توضع عليه كمية ml(±3)ml) من محلول الأمونيا (NH₃) (المجهزة من شركة CHD-India وبتركيز %25 وذات وزن جزيئي 17.03 g/mol) لغرض زيادة القاعدية للمحلول فيتحول محلول

(3-3-2) تحضير المحاليل

. g

$$*V * M_{\circ}$$
(1)

الجزء العملي

خلات الكادميوم Cd(CH₃COO)₂ الى لون حليبي ومع استمرارية الاضافة قطرات من محلول الامونيا يصبح pH=9.5 وعندها يصبح المحلول شفاف عديم اللون ، بعد ذلك يتم ترشيح المحلول للتخلص من الرواسب والجزيئات الكبيرة .

وفي اثناء ذلك وبدرجة حرارة الغرفة يتم تحضير محلول الثايوريا NH2)₂CS) وبتركيز (M 0.05) كمصدر لأيون الكبريت (المجهزة من شركة CHD-India ذات وزن جزيئي (76.12 g/mol) ونقاوة (%9.0%) و هو عبارة عن مسحوق ابيض سريع الذوبان في الماء المقطر، ومن خلال المعادلة (3-1) تم اذابة (g 0.76) في (200 ml) من الماء المقطر الخالي من الأيونات و باستخدام جهاز الخلط المغناطيسي لمدة 10 min لضمان ذوبان المحلول بشكل تام ويتم ترشيحه للتخلص من العوالق والجزيئات الكبيرة .

بعد ذلك يتم وضع المحلولان خلات الكادميوم والثايوريا في بيكر ml 500 ووضعه داخل حمام مائي كما في الشكل (3-2) ثم تغمر الارضيات داخل المحلول وبصورة عمودية للحصول على ترسيب متجانس لجميع أجزاء الغشاء، وباستخدام جهاز الخلط المغناطيسي يتم تحريك المحلول مع الحرارة ولمدة زمنية معينة وكما في الجدول (3-1) للحصول على اغشية CdS النقي وبسُمك ولمدة زمنية معينة وكما في الجدول (3-1) للحصول على اغشية 200 النقي وبسُمك متحا (3-2) م

2- التشويب بالألمنيوم (Doping of Al) : تم استخدام مادة كبريتات الالمنيوم المائية CHD- 412(SO₄)3.16H₂O ذات مسحوق ابيض وسريعة الذوبان في الماء (المجهزة من شركة -CHD in دات وزن جزيئي 630.38 g/mol ونقاوة 99.5%) وبتركيز (M 20.00)، وحسب India المعادلة (1-3) وفي درجة حرارة الغرفة تم اذابة (1.57 gm) في (100 ml) من الماء المقطر الخالي من الايونات وباستخدام جهاز الخلط المغناطيسي لمدة min 100 لضمان الذوبان التام ، وتم يتشويب الاغشية المحضرة وبنسب حجمية (2.5,5,7.5%) وكما موضحة في المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في الجدول (2-3) وبسمك عرفي الماء المعاصل الخالي من الاعشية المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في الجدول (2-3) وبسمك المحاصات الخالي من المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في المحضرة وبنسب معامة المعام المعام الموضحة في المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في المحسات المحاصات الخالي من الاعشية المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في الحدول (3.5%) وبسمك المحاصات الخالي المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في المحسات الحدول (3.5%) وبسمك المحاصات المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في المحسات الحدول (3.5%) وبسمك المحاصات المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في المحسات المحسات المحضرة وبنسب حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في المحسات المحصات المحسات وبلست حجمية (3.5,7.5%) وكما موضحة في المحسات الحدول (3.5%) وبسمك المحاصات المحصات وبنسب حجمية (3.5%) وكما موضحة في المحسات المحصات المحصات وبلست حجمية (3.5%) وكما موضحة في المحسات المحصات وبلست حجمية (3.5%) وكما موضحة في المحسات وبلست حجمية (3.5%) وكما موضحة في المحسات وبلست محصات المحصات وبلست حجمية (3.5%) وكما موضحة في المحصات وبلست حجمية (3.5%) وكما موضحة في المحصات وبلست حجمية (3.5%) وكما موضحة في المحصات وبلست حجمية (3.5%) وبلست وبلست وبلست وبلست حجمية (3.5%) وكما موضحة في المحسات وبلست حجمية (3.5%) وبلست وبلست

3- التشويب بالليثيوم (LiCl) وهي مسحوق (Doping of Li) وهي مسحوق أبيض سريع الذوبان في الماء المقطر (المجهزة من شركة Fluka-Switzerland ذات وزن جزيئي 42.39 g/mol ونقاوة %9.50) وبتركيز (M. 0.1) ،وحسب المعادلة (1-3) وفي درجة حرارة الغرفة تم إذابة (g. 2010) في (m. 50 ml) من الماء المقطر الخالي من الأيونات، وباستخدام جهاز الخلط المغناطيسي لمدة المصان الذوبان التام ، حيث تم تشويب الاغشية المحضرة وبنسب حجمية (ي. 25,5,7.5) وكما موضحة ايضاً في الجدول (2-3) وكذلك بسمك 450 ml).

الغصل الثالثم

الجزء العملي

Thickness	Time Deposition	Temperature	PH
<i>(nm)</i>	(min)	$({}^{o}C)$	
150	10	75	9.5
300	15	75	9.5
450	20	75	9.5

جدول (1-3) المعلمات المستخدمة في عملية الترسيب.

جدول (2-3) النسب الحجمية للمحاليل المستخدمة لتحضير الاغشية.

$Cd(CH_3COO)_2.2H_2O$	$Al_2(SO_4)_3.16H_2O(0.025M)$	النسبة المئوية
(0.025M)	or	للشائبة
$(NH2)_2 CS (0.05M)$	LiCl(0.1M)	
400ml	0	0%
390ml	10ml	2.5%
380ml	20ml	5%
370ml	30ml	7.5%

Thin Films Annealing

(4-3) تلدين الاغشية الرقيقة

لغرض إعادة تنظيم التركيب البلوري للمادة وكذلك العيوب البلورية يتم تلدين الاغشية المحضّرة حيث تمنح الذرات الطاقة الحركية اللازمة لإعادة ترتيب نفسها في الشبيكة البلورية، حيث استخدم الفرن الكهربائي نوع (MATEST) ذو مدى ℃ 1200 ، تم تلدين جميع الاغشية النقية والمشوبة بدرجة حرارة (℃ 300) ولفترة زمنية 1 hr .

Measurements

بعد اكتمال عملية الترسيب للاغشية المحضّرة النقية والمشوبة يتم اجراء القياسات الاتية :

Thickness Measurement

تم قياس سمك الأغشية الرقيقة بالطريقة الوزنية حيث يتم وزن الأرضيات الزجاجية بعد اكتمال تنظيفها وقبل عملية الترسيب بواسطة ميزان رقمي ذو حساسية g⁴-10 فتكون كتلتها m₁، وبعد

(3-5-1) قياس السُمك

(5-3) القياسات

الغطل الثالح

اكتمال عملية الترسيب يتم أعادة وزنها فتكون كتلتها m₂ وتحسب كتلة الغشاء من خلال الفرق بين الكتلتين قبل وبعد الترسيب ومن ثم حساب السمك (t) بعد معرفة أبعاد الغشاء ومن خلال المعادلة الاتية [57]:

$$t = \frac{m_2 - m_1}{\rho * A}$$
 (2-3)

حيث ان :ρ كثافة الغشاء CdS ، CdS حيث ان

وعند التشويب بالألمنيوم أو الليثيوم يتم حساب الكثافة الكلية من خلال العلاقة التالية :

الكثافة الكلية ptotal=كثافة CdS نسبتها الحجمية+كثافة المادة الشائبة (AI,Li) نسبتها الحجمية .

(2-5-3) تقنية حيود الاشعة السينية (2-5-3)

تم استخدام تقنية حيود الاشعة السينية (XRD) للتعرف على التركيب البلوري الدقيق للغشاء ، حيث تم تسليط اشعة سينية على الغشاء ستظهر قمم وفقاً لانعكاسات (براك) تمثل الذرات المترتبة باتجاه معين، ومن خلال البيانات الناتجة من فحوصات الاغشية المحضّرة يمكن حساب الحجم الحبيبي وثوابت الشبيكة وكثافة الانخلاعات وعدد الحبيبات والمطاوعة المايكروية ، وتكون مواصفات جهاز حيود الاشعة السينية الذي تم استخدامه في جامعة بغداد ابن الهيثم كالتالي :

Туре	XRD- 6000 Shimadzu
Target	Cu-Kα
Wave Length	1.54060 °A
Speed	5deg/min
Current	30mA
Voltage	40KV

الجزء العملي

الغطل الثالثم

(3-3-3) المجهر الالكتروني الماسح Scanning Electron Microscopy (SEM) لدراسة طبوغرافية السطح ومعرفة التركيب الداخلي للأغشية المحضّرة ومدى تجانسية الغشاء تم استخدام المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) نوع (SEM Manufacturer: FEL, Quanta)

450,Czech) في جامعة بابل كلية الصيدلة كما في الشكل (3-3) .



شكل (SEM) جهاز (SEM).

(AFM)) مجهر القوة الذرية (AFM)

لغرض معرفة خصائص تضاريس السطح وتوزيع الحبيبات ومعدل خشونة السطح تم استخدام جهاز مجهر القوة الذرية (AFM) وهو جهاز ذو قدرة تحليلية كبيرة حيث تم استخدامه في جامعة بغداد كلية العلوم ويحمل المواصفات الاتية :

standard unit	10 micron by 10 micron10
Туре	SPM AA3000 / Angstrom
_	Advanced Inc.
Company	U.S.A

Optical Measurements

الجزء العملي

تم فحص الاغشية الرقيقة المحضّرة (CdS) النقية والمشوبة بالألمنيوم والليثيوم وكذلك الاغشية المُلّدنة بواسطة جهاز (Cyprus, 1800, UV/Visible) جامعة بغداد ابن الهيثم كما

(3-6) القياسات البصرية

الغصل الثالث

في الشكل(3-4) وتم تسجيل طيفي النفاذية والامتصاصية لمدى الاطوال الموجية من -300) nm (1100 حيث تم حساب الانعكاسية، معامل الامتصاص، معامل الخمود، معامل الانكسار وفجوة الطاقة البصرية .

. UV-Visible شکل (4-3) جهاز

Electrical Measurements

الجزء العملي

تم إجراء فحوصات تأثير هول (Hall effect)، وحساب المقاومية و التوصيلية الكهربائية المستمرة ومنها حساب طاقة التنشيط .

Masks Preparation

تم تحضير الاقنعة (Masks) المعدّة لترسيب الاقطاب الكهربائية لقياس تجربة تأثير هول (Hall) والتوصيلية المستمرة (Effect Conductivity) باستخدام رقائق من الالمنيوم بحجم يتلائم مع حجم الغشاء الرقيق وكما في الشكل (5-3) ، حيث تم ترسيب الاقطاب في منظومة التبخير الحراري نوع (Edward 306-Thermal Evaporation Coating Unit) وضغط 10⁻³ (mbar) ، حيث تم استخدام الالمنيوم ذو النقاوة (%99.9) كمادة للأقطاب .

شكل (3-5) الاقنعة المستخدمة لترسيب الاقطاب الكهربائية

a: D.C conductivity b: Hall Effect .





(7-3) القياسات الكهربائية

(1-7-3) تحضير الاقنعة

الجزء العملي

Hall Effect Measurement

لتحديد خصائص أشباه الموصلات اذا كانت المادة من نوع n-type او من النوع p-type كذلك لتحديد كثافة حاملات الشحنة والتحركية وتركيز الحاملات ومعامل هول يستخدم قياس تأثير هول كما في الشكل (3-6) في جامعة بابل كلية العلوم والذي يحمل المواصفات الاتية :

Maximum sample size :20 mm * 20 mmMeasurement Temperature :300K, 77KResistivity Range : 10^{-4} to 10^7 (R.cm)Magnet Flux Density :0.55 TCurrent Source : Range : $\ln A - 20 mA$ Mobility (cm²/V.s) : $1 \approx 10^7$ Density (cm⁻³): $10^7 \approx 10^{21}$

شكل (3-6) جهاز قياس تأثير هول .

(3-7-3) قياس التوصيلية الكهربائية المستمرة

D.C. Electrical Conductivity Measurement

تم اجراء حساب التوصيلية المستمرة لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالألمنيوم والليثيوم قبل وبعد التلدين، وذلك من خلال دراسة اختلاف مقاومة الغشاء مع درجات الحرارة باستخدام الدائرة الكهربائية في الشكل (3–7) ويتم ذلك بوضع العينات داخل فرن حراري، ويتم تثبيت أسلاك من النحاس المعزول على أقطاب الالمنيوم باستخدام سيلفر بيست لغرض زيادة جودة التوصيل، ثم توصل الاسلاك بطرفي جهاز (Keithley 616 Digital Electrometer) حيث يحتوي الفرن على محرار



(2-7-3) قياس تأثير هول

الغصل الثالثم

```
الغصل الثالث
```

الجزء العملي

لقياس درجة الحرارة داخل الفرن ليتم قياس المقاومة كدالة لدرجة الحرارة للأغشية المحضّرة ومنها يمكن حساب مقاومية الغشاء والتوصيلية وكذلك حساب طاقة التنشيط.



شكل (3-3) الدائرة الكهربائية المستخدمة لقياس التوصيلية الكهربائية المستمرة .



النتائج والمناقشة

Introduction

يشمل هذا الفصل القياسات التي اجريت لأغشية كبريتيد الكادميوم (CdS) النقية والمشوبة بالألمنيوم والليثيوم وبنسب حجمية (7.5% , 5 , 7.5%) الذي يتضمن النتائج للخواص التركيبية والبصرية والكهربائية ومناقشة تلك النتائج وفقا لمتغيرات سمك الاغشية، نسب التشويب، وتلدين الاغشية .

(2-4) نتائج القياسات التركيبية Results of Structural Measurements

Results of X-Ray Diffraction

من خلال نتائج حيود الاشعة السينية لأغشية كبريتيد الكادميوم (CdS) النقية والمحضرة بسمك nm (450 , 300 , 450) قبل وبعد التلدين بدرجة حرارة C° 300 ولمدة (1 hr) ، وكذلك اغشية كبريتيد الكادميوم (CdS) المشوبة بالألمنيوم والليثيوم وبنسب حجمية (7.5%, 5, 7.5%) قبل وبعد التلدين لجميع الاغشية وكما في الشكل (1-4) , (1-4) , (2-4)) تبين أن جميع الاغشية ذات تركيب متعدد التبلور (polycrystalline) ومن النوع المكعب، وعند مقارنة الشدة ومواقع القمم للنتائج مع البطاقة (*ICDD*) ذات الرقم (10-00-000) وجد انها مطابقة معها مع وجود اختلاف بسيط بسبب الزيادة في السُمك أو الشوائب أو الفراغات الموجودة في الغشاء وهذه النتائج تتفق مع [87,88]

من الشكل (4-1) نلاحظ ان المادة منخفضة التبلور عند السمك (150nm) وتبدأ الزيادة في التبلور من خلال زيادة في شدة القمم للمستويات البلورية مع زيادة سمك الاغشية وكذلك عند تلدين الاغشية حيث تترتب الذرات ويزداد تراصفها ، حيث تقل الحدود الحبيبية بين الحبيبات للأغشية وهذه النتائج تتفق مع [89,90,91] .

(1-4) المقدمة

الغصل الرابع

(1-2-4) نتائج حيود الاشعة السينية



شكل (1-4) حيود الاشعة السينية لأغشية CdS قبل وبعد التلدين لسمًك nm (450, 300).

الغطل الرابع

النتائج والمناقشة

No.	Material	thiknees (nm)	2 0 (deg)	d(Å) Observed	d(Å) Standard	FWHM	(hkl)
1	CdS	150	26.35	3.37	3.35	1.45	(111)
2	CdS	300	26.82 43.9	3.32 2.06	3.35 2.07	0.95 0.7	(111) (220)
3	CdS	450	26.75 44.12 52.1	3.32 2.05 1.75	3.35 2.07 1.76	$0.82 \\ 0.66 \\ 0.4$	(111) (220) (311)
4	CdS (ann)	150	26.69	3.33	3.35	0.78	(111)
5	CdS (ann)	300	26.96 43.87	3.3 2.06	3.35 2.07	0.72 0.24	(111) (220)
6	CdS (ann)	450	26.79 44.21 52.21	3.32 2.04 1.75	3.35 2.07 1.76	0.54 0.28 0.3	(111) (220) (311)

جدول(1-4) نتائج حيود الاشعة السينية لأغشية CdS لسُمك nm (150,300,450) قبل وبعد التلدين.

الشكل (4-4), (4-4) يمثل حيود الاشعة السينية لأغشية (CdS) المحضّرة بسُمك nm (450) والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم على التوالي قبل وبعد التلدين كانت شدة القمم واضحة عند المستو (111) مما جعله المستو المفضل للنمو مع بروز طفيف لباقي مواقع القمم عند المستويات (311) واختلاف بسيط في مواقعها بسبب نسب التشويب، مع ملاحظة زيادة طفيفة في شدة القمم مع زيادة نسب التشويب للألمنيوم والليثيوم وكذلك عند المعاملة الحرارية لجميع الاغشية ، وهذه النتائج تتفق مع [37,92,93,94] .

45



شكل (2-4) حيود الاشعة السينية لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم قبل وبعد التلدين .



شكل (3-4) حيود الاشعة السينية لأغشية CdS المشوبة بالألمنيوم قبل وبعد التادين .

النتائج والمناقشة

الغصل الرابع

جدول (2-4) نتائج حيود الاشعة السينية (XRD) لأغشية كبريتيد الكادميوم (CdS) والمشوبة

No.	Material	thickness (nm)	20 (deg)	d(Å) Observed	FWHM	(hkl)
1	CdS:Li 2.5%	450	26.84 44.32 51.56	3.31 2.04 1.77	0.88 0.42 0.2	(111) (220) (311)
2	CdS:Li 5%	450	26.74 44.11 51.95	3.33 2.05 1.75	0.81 0.56 0.58	(111) (220) (311
3	CdS:Li 7.5%	450	26.88 44.61 52.04	3.31 2.02 1.75	0.76 0.6 0.44	(111) (220) (311)
4	CdS:Li 2.5%(ann)	450	26.77 44.01 52.19	3.32 2.05 1.75	0.82 1.04 0.26	(111) (220) (311)(
5	CdS:Li 5%(ann)	450	26.75 44.17 52.19	3.32 2.04 1.75	0.78 0.87 0.34	(111) (220) (311)(
6	CdS:Li 7.5%(ann)	450	26.86 44.25 51.83	3.31 2.04 1.76	0.67 0.60 0.50	(111) (220) (311)
7	CdS:Al 2.5%	450	26.63 44.10 51.72	3.34 2.05 1.76	1.02 0.78 0.32	(111) (220) (311)
8	CdS:Al 5%	450	26.72 44.07 52.26	3.33 2.05 1.74	0.96 0.84 0.76	(111) (220) (311)
9	CdS:Al 7.5%	450	26.64 44.13 52.38	3.34 2.05 1.74	0.925 0.72 0.16	(111) (220) (311)
10	CdS:Al 2.5%(ann)	450	26.67 44.14 52.26	3.33 2.05 1.74	1.02 0.94 0.92	(111) (220) (311)
11	CdS:Al 5%(ann)	450	26.78 44.3 52.44	3.32 2.04 1.74	1.0 0.62 0.81	(111) (220) (311)
12	CdS:Al 7.5%(ann)	450	26.65 44.04 52.20	3.34 2.05 1.75	0.96 0.87 0.88	(111) (220) (311)

بالليثيوم والالمنيوم بنسب %(2.5,5,7.5) قبل وبعد التلدين.

5

نسب التشويب %

4

6

7

8

5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 **6** 5.4 -CdS 5.3 CdS(ann) 5.2 5.1 5 150 250 350 450 550 السمك (nm) 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 **6** 5.4 CdS:Li 5.3 CdS:Li(ann)

5.2 5.1 5

2

3

تم حساب ثوابت الشبيكة من خلال المعادلة (2-2) لأغشية كبريتيد الكادميوم النقى والمشوب بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين لجميع الاغشية، ومن خلال النتائج التي تم الحصول عليها في الجدول -3) (4 وجد ان قيمة ثابت الشبيكة a مقاربة لقيمتها في البطاقة (ICDD) ذات الرقم (00-010-0454) ،ومن خلال الشكل(4-4) تم ملاحظة نقصان قليل في قيمة a بزيادة السمك وثبوتها تقريبا عند زيادة نسب تشويب الليثيوم ، وزيادة بسيطة جدا عند زيادة نسب التشويب بالألمنيوم قبل وبعد التلدين لجميع الاغشية وهذا يؤكد ان ذرات الالمنيوم والليثيوم شغلت مواقع استبداليه لبلورة (CdS) وهذا يتفق مع . [41,94]

Lattice Constants

النتائج والمناقشة

Results of Structure Parameters

(2-2-4) نتائج المعلمات التركيبية

الهصل الرابع

 ثوابت الشبيكة



شكل (4-4) ثابت الشبيكة a كدالة لتغير السمك لأغشية CdS ونسب التشويب %(2.5,5,7.5). بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين

Texture Coefficient

بالاعتماد على المعادلة (2-3) تم حساب عامل التشكيل _T حيث كانت قيمته للمستو (111) أكبر من واحد ولجميع اغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين مما يجعله هو المستو السائد والمفضل للنمو وهذا يتفق مع [87,88] .

Average Crystallites Size

تم حساب معدل الحجم الحبيبي بالاعتماد على المعادلة (2-4) للمستو المفضّل للنمو (111) ومن خلال الجدول (4-3) نلاحظ أن الحجم الحبيبي يزداد بزيادة السُمك ، حيث تزداد عملية التبلور ويكتمل البناء البلوري مع زيادة السمك [24] ، كذلك عند تشويب أغشية (CdS) نلاحظ زيادة طفيفة في الحجم الحبيبي بزيادة نسب تشويب الليثيوم ومتباين نحو الزيادة عند التشويب بالألمنيوم ، كذلك عند تلدين جميع الاغشية النقية والمشوبة نلاحظ زيادة في الحجم الحبيبي وتعزى الزيادة الى نقصان العيوب البلورية أذ تأخذ الذرات مواقعها الحقيقية وتعيد ترتيب نفسها مما تؤدي الى زيادة في حجم الحبيبات . [28,95]

كثافة الانخلاعات

Dislocation Density

تم حساب كثافة الانخلاعات (δ) وعدد البلورات (N₀) بالاعتماد على معادلة (2-5) و (6-2) على التوالي والنتائج المدرجة في الجدول (4-3) توضح ان كثافة الانخلاعات وعدد البلورات تقل بزيادة

عامل التشكيل T.

معدل الحجم الحبيبي
```
الغصل الرابع
```

```
النتائج والمناقشة
```

الحجم الحبيبي وهذا مؤشر على تحسين البنية البلورية والشكل (4-5) يوضح كثافة الانخلاعات وعدد البلورات كدالة لنسب التشويب وتغيّر سُمك الاغشية قبل وبعد التلدين [89,96].



شكل (4-5) كثافة الانخلاعات وعدد البلورات كدالة للسُمك ونسب التشويب قبل وبعد التلدين.

الغصل الرابع والمناقشة	
------------------------	--

المطاوعة المايكروية

Micro strain

بالاعتماد على المعادلة (2-7) تم حساب المطاوعة المايكروية وكما في الشكل (4-6) نلاحظ ان المطاوعة تقل عند زيادة السُمك وعند تشويب أغشية (CdS) بالليثيوم والالمنيوم، وبصورة عامة عند تلدين جميع الاغشية نلاحظ نقصان في المطاوعة المايكروية وهذا مؤشر جيد لتحسين خصائص الغشاء [41,89,94].



شكل (4-6) المطاوعة المايكروية كدالة للسُمك ونسب التشويب قبل وبعد التلدين.

الغصل الرابع

النتائج والمناقشة

جدول (4-3) نتائج المعلمات التركيبية لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين .

No.	Stat e	Material	thickness (nm)	Averag e crystalli ne Size (nm)	a (Å)	Тс	δx10 ¹⁶ (m ⁻²)	<i>N₀x10¹</i> ⁸ (m⁻²)	S
1	قبل التلدين	CdS	150	5.87	5.83	1	2.89	0.73	0.35
2		CdS	300	8.97	5.75	1.4	1.23	0.41	0.23
3		CdS	450	10.39	5.75	1.9	0.92	0.40	0.19
4	بعد التلدين	CdS	150	10.92	5.76	1	0.83	0.11	0.18
5		CdS	300	11.84	5.71	1.6	0.71	0.18	0.17
6		CdS	450	15.79	5.75	1.7	0.40	0.11	0.13
7	قبل التلدين	CdS:Li 2.5%	450	9.69	5.73	1.8	1.06	0.49	0.21
8		CdS:Li 5 %	450	10.52	5.76	1.4	0.90	0.38	0.19
9		CdS:Li 7.5 %	450	11.22	5.73	1.4	0.79	0.31	0.18
10	بعد التلدين	CdS:Li 2.5%	450	10.39	5.75	1.7	0.92	0.40	0.19
11		CdS:Li 5 %	450	10.93	5.75	1.7	0.83	0.34	0.18
12		CdS:Li 7.5 %	450	12.72	5.73	1.6	0.62	0.22	0.16
13	قبل التلدين	CdS:AI 2.5%	450	8.35	5.78	1.8	1.43	0.77	0.24
14		CdS:AI 5 %	450	8.88	5.76	1.7	1.26	0.64	0.23
15		CdS:AI 7.5 %	450	9.21	5.78	1.9	1.17	0.57	0.22
16	بعد التلدين	CdS:AI 2.5%	450	8.35	5.76	1.8	1.43	0.77	0.24
17		CdS:AI 5 %	450	8.52	5.75	1.9	1.37	0.72	0.24
18		CdS:AI 7.5 %	450	8.87	5.78	1.7	1.27	0.64	0.23

	<u>هشم</u>	مالمنا	النتائد
--	------------	--------	---------

المحل الرابع

Result of (SEM) measurement (3-2-4) نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح

يوضّح الشكل (4-7) نتائج فحص جهاز المجهر الالكتروني الماسح (SEM) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم والملدنة بدرجة حرارة (C° 300) والمحضرة على ارضيات زجاجية بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي ، حيث بيّنت الصور أن اغشية (CdS) يزداد تجانسها بالتشويب بالألمنيوم و الليثيوم وتقل الفراغات ، وكذلك عند تلدين الاغشية النقية والمشوبة يظهر واضحاً عملية اكتمال النمو البلوري وتقل العيوب وهذه النتيجة تتفق مع زيادة حجم الحبيبات المشيّخصة من نتائج حيود الاشينية [97,98] .





شكل (2-4) صور (SEM) بقوة تكبير (CdS :b CdS :a (1µm, 5µm) بعد التلدين CdS:7.5%Al:f CdS:7.5%Al:e بعد التلدين CdS:7.5%Al:f CdS:7.5%Al:e بعد التلدين.

الغطل الرابع

النتائج والمناقشة

Result of (AFM) measurement نتائج قياسات مجهر القوة الذرية 4-2-4)

تم تشخيص أغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين بجهاز مجهر القوة الذرية (AFM) ، ومن خلال الشكل (AFM) نلاحظ ان صور الاغشية ببعدين (2D) وثلاثة ابعاد (3D) ذات توزيع متجانس وخالي من الفراغات وتتضمن الاشكال منحني التوزيع الحجمي للحبيبات البلورية حيث يتباين مع التشويب بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين ، وتبين من الحجمي للحبيبات البلورية حيث يتباين مع التشويب ومعدل الجذر التربيعي تزداد عند تشويب والأغشية المنوب والالمنيوم قبل وبعد التلدين ، وتبين من الخرية الحجمي للحبيبات البلورية حيث يتباين مع التشويب بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين ، وتبين من الخرل النتائج المدرجة في الجدول (4-4) أن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي تزداد عند تشويب والأغشية النقية النقية بالليثيوم او الالمنيوم الممك (450nm)، وايضاً تزداد عند تلويب والمشوبة بالأغشية النوب يوهذه النتائج المدرجة في الحول (4-4) أن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي الاغشية النقية الأغشية النقية والمنوب الالمنيوم الممك (450nm)، وايضاً تزداد عند تشويب والمشوبة بالليثيوم بعد التلدين الاغشية النقية النقية والمنوب الأغشية المنوب بالليثيوم والالمنيوم والامنيوم والامنيوم والامنيوم والاغات و تبيعي تزداد عند تشويب خلال النتائج المدرجة في الجدول (4-4) أن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي الاغشية النقية الأغشية النتية المدرجة في الجدول (4-4) أن خشونة السطح ومعدل الجذر التربيعي تزداد عند تشويب و المشوبة بالأغشية النوب الاغشية النقية وهذه النتائج تنفق مع فحوصات والمشوبة بالليثيوم بعد التلدين وهذه النتائج تنفق مع فحوصات والمشوبة باللينية الماسح (30) [300] .







شكل (4-8) صور (AFM) ببعدين (2D) وثلاثة ابعاد (3D) ومخطط التوزيع الاحصائي لمعدلات الحجوم الحبيبية CdS:5.5%Li:d CdS:7.5%Li:c بعد التلدين CdS:7.5%Li:d CdS:7.5%Li:c بعد التلدين . CdS:7.5%Al:f CdS:7.5%Al:f

جدول (4-4) نتائج فحوصات مجهر القوة الذرية (AFM) .

Materials	Root Mean	Roughness	Ten point	Average
	Square(nm)	(nm)	height	diameter
CdS	3.37	2.87	7.05	87.04 nm
CdS (annealing)	5.61	4.67	14	94.20 nm
CdS:7.5%Li	5.17	4.4	19.5	64.33 nm
(annealing) CdS:7.5%Li	8.36	7.27	15.7	121.82 nm
CdS:7.5%AI	11.4	9.87	39.6	103.14 nm
CdS:7.5%Al (annealing)	7.03	5.98	27.1	72.10 nm

Results of optical measurements

تضمنت القياسات البصرية دراسة تأثير تغير السُمك ونسب التشويب كل من الليثيوم والالمنيوم على الخصائص البصرية لأغشية (CdS) وكذلك تأثير التلدين على جميع الاغشية المحضّرة ، حيث تم تسجيل طيفي النفاذية والامتصاصية ومن خلالها يمكن حساب الإنعكاسية وفجوة الطاقة البصرية ونوع الانتقالات الالكترونية وحساب بعض الثوابت البصرية كمعامل الامتصاص، معامل الخمود ومعامل الانكسار .

Transmittance

1

تم قياس طيف النفاذية لأغشية (CdS) النقية بسُمك nm (150,300,450) قبل وبعد التلدين والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم بنسب حجمية (% CdS, 5, 7.5) قبل وبعد التلدين لجميع الاغشية ضمن مدى الاطوال الموجية nm (300,100) ، يوضح الشكل (4-9) النفاذية كدالة للطول الموجي لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية ولسُمك nm (300,450) ، يوضح الشكل (4-9) النفاذية كدالة للطول الموجي لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية ولسُمك nm (300,450) ، يوضح الشكل (4-9) النفاذية كدالة للطول الموجي لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية ولسُمك nm (300,450) ، يوضح الشكل (4-9) النفاذية كدالة للطول الموجي لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية ولسُمك nm (300,450) ، يوضح الشكل (4-9) النفاذية كدالة للطول الموجي لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية ولسُمك nm (300,450) ، يوضح الشكل و سبب ذلك هو زيادة الطول الموجي الموجي الموجي [38]. كما تمت ملاحظة ان النفاذية تقل بزيادة السُمك وسبب ذلك هو زيادة إمتصاصية الموجي الغشاء [30]. كما تمت ملاحظة ان النفاذية تقل بزيادة الطاقة يسبب زيادة الامتصاصية وهذا يؤدي الغشاء [30]. كما تمت ملاحظ من الشكل (4-9) ان النفاذية تزداد عند التلدين وذلك لتحسن تركيب الغشاء [30].



شكل (4-9) النفاذية لأغشية (CdS) النقية لسمك nm (450, 300, 150) قبل وبعد التلدين.

(1-3-4) النفاذية

الغصل الرابع

(4-3) نتائج القياسات البصرية

الهصل الرابع

النتائج والمناقشة

نلاحظ من الشكل (CdS) النفاذية كدالة للطول الموجي لأغشية (CdS) المشوبة بالليثيوم والألمنيوم وبنسب حجمية (% 7.5 , 5 , 7.5) ان النفاذية تزداد بزيادة الطول الموجي ، وتقل بزيادة نسب التشويب ويعزى ذلك الى زيادة الامتصاصية بزيادة نسب التشويب [35,103] .



شكل (4-10) النفاذية (T) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة a: بالليثيوم b: بالألمنيوم.

ومن خلال ملاحظة الشكل (4-11) الذي يمثل النفاذية لأغشية (CdS) والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم وبنسب (7.5% , 5 , 2.5) قبل وبعد التلدين يتبين ان النفاذية تزداد زيادة طفيفة عند التلدين بدرجة حرارة (° (300) مما يدل على تحسن الخصائص التركيبية للغشاء [28,94] .

الهصل الرابع

النتائج والمناقشة

ومما يجدر الذكر اليه ملاحظة الأشكال (4-9) (4-10) (4-11) زيادة سريعة في النفاذية عند الطول الموجي nm (20±20) [24] ، وان الاغشية المحضرة تمتلك نفاذية %80 مما يتيح استخدامها في التطبيقات الالكتروبصرية .



شكل (11-4) تأثير التلدين على نفاذية أغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم.

(2-3-4) الامتصاصية

Absorbance

تم قياس طيف الامتصاصية كدالة للطول الموجي لمدى nm (300-1100) لجميع اغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين . من الشكل (4-12) الذي يمثل الامتصاصية لأغشية CdS النقية وبسُمك nm (300, 450) قبل وبعد التلدين نلاحظ أن الامتصاصية تقل بزيادة

```
الغصل الرابع
```

الطول الموجي ، بينما تزداد بزيادة السُمك وهذه النتائج متفقة مع [89]، كما نلاحظ من الشكل (12-4) ادت عملية تلدين الاغشية الى نقصان في الامتصاصية [24] .



شكل (12-4) الامتصاصية لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm(450, 300, 150) قبل وبعد التلدين.

ومن الشكل (4-13) الذي يمثل الامتصاصية كدالة للطول الموجي لأغشية (CdS) المشوب بالليثيوم ومن الشكل (13-4) الذي يمثل الامتصاصية تكون عالية ثم تقل والالمنيوم بنسب حجمية (% 7.5 , 5 , 7.5) حيث نلاحظ ان الامتصاصية تكون عالية ثم تقل بزيادة الطول الموجي لتصل اقل قيمة لها عند المنطقتين المرئية والحمراء القريبة مما يتيح استخدام هذه الاغشية كنوافذ في تطبيقات الخلايا الشمسية [104] ، كما نلاحظ ان الامتصاصية تزداد بزيادة نسب التشويب [105] . كذلك عند ملاحظة الشكل (4-13) يتبين أن الإمتصاصية تنغير بصورة متباينة نحو النقصان عند تلدين المرئية والالمنيوم بنسب (% 2.5 , 7.5) من ناد من المرئية والحمراء القريبة مما يتيح استخدام هذه الاغشية كنوافذ في تطبيقات الخلايا الشمسية المرئية (104] ، كما نلاحظ ان الامتصاصية تزداد بزيادة نسب التشويب [105] . كذلك عند ملاحظة الشكل (4-13) يتبين أن الإمتصاصية تنغير بصورة متباينة نحو النقصان عند تلدين اغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم بنسب (% 2.5 , 7.5) [45] .





شكل (4-13) الامتصاصية (Abs) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة a: بالليثيوم b: بالألمنيوم.



شكل (4-14) تأثير التلدين على امتصاصية أغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم.

الغصل الرابع

Reflectance

(3-3-4) الانعكاسية

تم حساب الانعكاسية وذلك بالاعتماد على طيفي النفاذية والامتصاصية بالاعتماد على قانون حفظ الطاقة وحسب المعادلة (2-12) .يوضح الشكل (4-15) الانعكاسية لأغشية CdS النقية وبسمك (15-4) الانعكاسية لأغشية CdS النقية وبسمك nm (150 , 300, 450) معلم وبعد التلدين كدالة للطول الموجي حيث نلاحظ زيادة في الانعكاسية بزيادة الطول الموجي الموجي معلم النعكاسية بزيادة الموجي الموجي تبدأ (20%) مع تبدأ الزيادة الطول الموجي الموجي الموجي الموجي الموجي على على النعكاسية النعكاسية الانعكاسية وبسمك الموجي معلم النعكاسية وبسمك النعكاسية الموجي الموجي الموجي الانعكاسية النعكاسية النعكاسية النعكاسية النعكاسية النعكاسية الموجي المول الموجي المول الموجي الموجي المول الموجي المول الموجي المول الموجي المول الموجي الموجي الموجي الموجي المولي الموجي المو



شكل (4-15) الانعكاسية لأغشية (CdS) النقية لسمك nm (450, 300, 150) قبل وبعد التلدين.

كذلك من الشكل (4-16) نلاحظ ان الانعكاسية تقل عند زيادة نسب التشويب بالليثيوم والالمنيوم عند الاطوال الموجية القصيرة بينما تزداد قيمتها بزيادة نسب التشويب في المنطقتين المرئية و تحت الحمراء القريبة [39].





شكل (4-16) الانعكاسية (R) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة a: بالليثيوم b: بالألمنيوم.

يوضح الشكل (4-17) تأثير التلدين على الانعكاسية لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم بنسب (% 7.5 , 5 , 2.5) كدالة للطول الموجي حيث نلاحظ ان عملية التلدين اثرت على الانعكاسية بصورة متباينة نحو الزيادة وهذا يعزى الى تغير التركيب البلوري مما ادى الى تغير سطوح الاغشية [96] .





شكل (4-17) تأثير التلدين على انعكاسية أغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم.

Absorption Coefficient

(4-3-4)معامل الامتصاص



شكل (4-18) معامل الامتصاص لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm (150, 300, 450) قبل وبعد التلدين.



شكل (β-4) معامل الامتصاص (α) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والألمنيوم.



شكل (4-20) تأثير التلدين على معامل الامتصاص لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم.

الهصل الرابع

Refractive Index

(n) معامل الانكسار (n)

تم حساب معامل الانكسار بالاعتماد على المعادلة (2-23) لأغشية CdS النقية والمشوبة . يوضح الشكل (4-21) تغير معامل الانكسار بالنسبة لطاقة الفوتون الساقط لأغشية CdS النقية والمحضرة بسُمك mm (CdS , 300, 450) الغير ملدنة والملدنة بدرجة حرارة C 300 لمدة ساعة واحدة حيث بسُمك mm (5.00 للعن على النقل (4-21) تغير معامل الانكسار بزيادة السمك ، بينما يقل عند التلدين وهذا يدل على تحسن الخصائص التركيبية وتقليل العيوب عند المعاملة الحرارية التي تعمل على انتظام الحبيبات وزيادة الحجم الحبيبي والتركيبية وتقليل العيوب عند المعاملة الحرارية التي تعمل على انتظام الحبيبات وزيادة الحجم الحبيبي وبالتالي زيادة التراص للذرات مما يؤدي الى تقليل معامل الانكسار [33] . والشكل (4-22) يوضح وبالتالي زيادة التراص للذرات مما يؤدي الى تقليل معامل الانكسار [33] . والشكل (4-22) يوضح وبالتالي زيادة التراص للذرات مما يؤدي الى تقليل معامل الانكسار الاييوم والالمنيوم بنسب , 7.5 (0 × 7.5 , 0) وبالتالي زيادة التراص للذرات مما يؤدي الى تقليل معامل الانكسار الاييوم والالمنيوم بنسب , 7.5 (0 × 7.5 , 0) وبالتالي زيادة التراص للذرات مما يؤدي الى تقليل معامل الانكسار الاييوم والالمنيوم بنسب , 7.5 (0 × 7.5 , 0) وبالتالي زيادة التراص للذرات مما يؤدي الى تقليل معامل الانكسار الالمنيوم والالمنيوم بنسب , 7.5 (0 × 7.5 , 0) وبالتالي زيادة المالة الفوتون لأغشية CdS الماقات الواطئة ليصل الى أعلى قيمة عند طاقة الفوتون وبا (9 (20± 2.5) ثم يبدأ بالتناقص عند الطاقات العالية للفوتون الساقط [96]. وعند تلدين الاغشية المشوبة بالليثيوم والالمنيوم نلاحظ قيم متباينة في قيم معامل الانكسار نحو الانخفاض، حيث يقل عند التلدين في الطاقات الواطئة ويزداد في الطاقات العالية للفوتون كما في الشكل (4-23). كما الاغشية المشوبة باليثيوم والالمنيوم نلاحظ قيم متباينة في قيم معامل الانكسار خوالانكسار خوالانكسار خوالانكسار خوال الاغشيان الاغشية المشوبة بالتدين مي الطاقات العالية للفوتون كما في الشكل (4-23). كما الاغشية المقوتون كما في الماليكان متبابله يقل منداني معامل الانكسار في جميع الاشكال مشابها لمنحني الانكاس، حيث الحظ أن طبيعة منحني معامل الانكسار في جميع الاشكال مشابها لمنحني الانكاس، حيث الحظ أن طبيعة منحني معامل الانكسار في جميع الاشكال مشابها لمنحني الاركاس، حيال الايعامي وراك ما وي ولكال



شكل (21-4) معامل الانكسار لأغشية (CdS) النقية لسُمك nm (300, 450) قبل وبعد التلدين.



شكل (22-4) معامل الانكسار (n) لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والألمنيوم.





شكل (4-23) تأثير التلدين على معامل الانكسار لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم.

Extinction Coefficient

(k₀) معامل الخمود (6-3-4)

تم حساب معامل الخمود حسب العلاقة (2-2) لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين . يوضح الشكل (4-22) معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون الساقط لأغشية CdS النقية وبعد التلدين . يوضح الشكل (4-22) معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون الساقط لأغشية CdS النقية ولسُمك nm (200, 300, 450) غير الملدنة والملدنة بدرجة C 300 لمدة ساعة واحدة حيث نلاحظ زيادة معامل الخمود بزيادة طاقة الفوتون الساقط مع زيادة سريعة عند طاقة الفوتون ±2.2) ولائمك eV (2.0 وهذا يعني حدوث انتقالات الكترونية في هذه المنطقة [109,110]. بينما عند التلدين نلاحظ إنخفاض في قيم معامل الخمود [111]. ويوضح الشكل (4-22) تغير معامل الخمود كرالة لطاقة الفوتون الساقط مع زيادة سريعة عند طاقة الفوتون الكرين فلاحظ زيادة معامل الخمود بزيادة طاقة الفوتون الساقط مع زيادة سريعة عند طاقة الفوتون المرين فلاحظ زيادة معامل الخمود بزيادة طاقة الفوتون الساقط مع زيادة سريعة عند طاقة الفوتون المرين في فلاحظ زيادة معامل الخمود بزيادة طاقة الفوتون الساقط مع زيادة سريعة عند طاقة الفوتون المرين فلاحظ زيادة معامل الخمود بزيادة طاقة الفوتون الساقط مع زيادة سريعة عند طاقة الفوتون المرين في فلاحظ زيادة معامل الخمود بزيادة والقالات الكترونية في هذه المنطقة [109,110]. بينما عند التلدين نلاحظ إنخفاض في قيم معامل الخمود [111]. ويوضح الشكل (4-22) تغير معامل الخمود كرالة لطاقة الفوتون لأغشية (7.5 , 7.5 , 0) حيث

الغطل الرابع

النتائج والمناقشة

نلاحظ معامل الخمود يزداد عند الزيادة في نسب التشويب لليثيوم والالمنيوم وهذا يرجع الى زيادة المستويات الموضعية التي تخللت المستويات الاساسية نتيجة الزيادة في نسب التشويب [28]. وعند تلدين اغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم نلاحظ معامل الخمود يقل عند التلدين كما في الشكل (26-4) [111]. وعموماً معامل الخمود يسلك سلوكا مشابها لمعامل الامتصاص لأنه يعتمد عليه وفق المعادلة (4-25).





شكل (24-4) معامل الخمود لأغشية (CdS) النقية لسُمك 300, 450) nm قبل وبعد التلدين.



شكل (4-25) معامل الخمود لأغشية (CdS) النقية والمشوبة بالليثيوم والألمنيوم.



شكل (4-26) تأثير التلدين على معامل الخمود لأغشية CdS المشوبة بالليثيوم والالمنيوم.

الغصل الرابع

Optical Energy Gap

(4-3-4) فجوة الطاقة البصرية

تم حساب قيمة فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الالكترونية المباشرة المسموحة وذلك باستخدام معادلة (2-8) عندما تكون قيمة (r=1/2) وذلك من خلال رسم العلاقة البيانية بين طاقة الفوتون الساقط (hw) وبين ²(αhw) وبرسم المماس الخارجي لمنطقة الامتصاص العالي للمنحني ليقطع محور طاقة الفوتون عندما (hw) وبين ²(αhw) وبرسم المماس الخارجي لمنطقة الامتصاص العالي للمنحني ليقطع محور طاقة الفوتون عندما 0=y حيث تمثل نقطة التقاطع عند المحور x هي قيمة فجوة الطاقة البصرية ، ومن خلال الاشكال (2-8), (2-8) ، (2-7) أظهرت النتائج المبينة في الجدول (4-5) فجوة الطاقة تقل بزيادة السمك (24,28)، والالمنيوم والالمنيوم وذلك لأن الشوائب عملت على خلال الاشكال (24,28)، والالغرب بالليثيوم والالمنيوم وذلك لأن الشوائب عملت على بزيادة السمك [24,42,89]، وتقل عند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وذلك لأن الشوائب عملت على بزيادة السمك (24,42,89]، وتقل عند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وذلك لأن الشوائب عملت على بزيادة السمك (24,42,89]، وتقل عند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وذلك لأن الشوائب عملت على بزيادة السمك (24,42,89]، وتقل عند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وذلك لأن الشوائب عملت على بزيادة السمك (24,42,89]، وتقل عند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وذلك لأن الشوائب عملت على تكوين مستويات موضعية داخل فجوة الطاقة أدت الى امتصاص الفوتونات ذات الطاقة الواطئة فتقل المصرية تقل عند تلدين جميع الاغشية بدرجة حرارة ع⁶ 300 لمدة ساعة واحدة ويمكن تفسير ذلك الى الشرات وتعيد ترتيبها مما يقال من العيوب البلورية [39,112]. أما القيمة العالية تصطف الدرات وتعيد ترتيبها مما يقال من العيوب البلورية [39,112]. أما القيمة العالية تصطف المرية في الذرات وبالتالي تصطف الدرات وجود تأثير الحصر الكمي للأغشية المحضرة الطاقة القياسية يعزى الى تشكيل جسيمات ناتوية الدرات وبوجود تالمودين العروب البلورية [39,112]. فودة الطاقة القياسية يعزى الى تشكيل جسيمات ناتوية الذرات ورعيد وراتئيج التجريبية معادنة مع فجودة الطاقة القياسية يعزى الى المحارة مع فجودة اللموري الى تشكيل جسيمات ناتوية الحررية في النتائج المحررة الراحة المحضرة [113,112]. فاذا كان المجال صغير فحركة اللحرين والثقب يتم تقيدها فتبدو محصورة فتودي الى زيادة الطاقة المطاوبة الملوبة الحفيرة الاكرزون وركاني المحال المحمرة المحرية الملوبة المط





شكل (27-4) قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الالكترونية المسموحة لأغشية (CdS) النقية لسُمك (1-22) قبل وبعد التلدين



77



شكل (4-28) قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الالكترونية المسموحة لأغشية (CdS) النقية







شكل (4-29) تأثير التلدين على قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الالكترونية المسموحة لأغشية المشوبة بالليثيوم والالمنيوم.

جدول (4-5) قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الكترونية المباشرة المسموحة

sample	Eg(eV) قبل التلدين	Eg(eV) بعد التلدين
CdS(150nm)	2.97	3
CdS(300nm)	2.92	2.99
CdS(450nm)	2.89	2.91
CdS:2.5%Li	2.81	2.85
CdS:5%Li	2.79	2.81
CdS:7.5%Li	2.72	2.77
CdS:2.5%Al	2.85	2.88
CdS:5%Al	2.79	2.82
CdS:7.5%Al	2.81	2.85

لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين.

(4-4) نتائج القياسات الكهربائية Results of electrical measurements

تضمنت القياسات الكهربائية دراسة تأثير التلدين وتشويب كل من الليثيوم والالمنيوم بنسبة (7.5%) على الخصائص الكهربائية لأغشية (CdS)، حيث تم قياس مقاومة الاغشية وذلك من خلال التغير الحاصل في درجات الحرارة ضمن المدى K (473 -303) ومن ثم حساب المقاومية والتوصيلية والتعرف على ميكانيكيات الانتقال وحساب طاقة التنشيط وحساب تركيز الحاملات ومعامل هول .

الهصل الرابع

Resistivity

(1-4-4) المقاومة النوعية

تم حساب المقاومة النوعية (ρ) بالاعتماد على المعادلة (2-26) و الشكل (4-30) يوضح المقاومة النوعية كدالة لدرجة الحرارة لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم بنسبة (7.5%) قبل وبعد التلدين حيث نلاحظ ان المقاومة النوعية تقل بزيادة درجات الحرارة لجميع الاغشية وهذه صفة مميزة بأشباه الموصلات وهذا يرجع الى زيادة كثافة الحاملات بزيادة درجة الحرارة وتنتقل من حزمة مميزة بأشباه الموصلات وهذا يرجع الى زيادة كثافة الحاملات بزيادة درجة الحرارة وتنتقل من حزمة مميزة بأشباه الموصلات وهذا يرجع الى زيادة كثافة الحاملات بزيادة درجة الحرارة وتنتقل من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل لامتلاكها الطاقة الكافية وبالتالي يزداد عددها في حزمة التوصيل مما يؤدي الى زيادة التوصيل المقاومة النوعية . وان أعلى قيمة للمقاومة النوعية هي x 26.3) بيودي الى زيادة التوصيلية ونقصان المقاومة النوعية . وان أعلى قيمة للمقاومة النوعية هي x 26.3) التكافؤ (2-20) أن المقاومة النوعية وبالتالي يزداد عددها في حزمة التوصيل مما يؤدي الى زيادة التوصيلية ونقصان المقاومة النوعية . وان أعلى قيمة للمقاومة النوعية هي x 26.3) التكافؤ (2-20) أن المقاومة النوعية وبالتالي يزداد عددها في حزمة التوصيل ما يؤدي الى زيادة التوصيلية ونقصان المقاومة النوعية . وان أعلى قيمة للمقاومة النوعية هي x 26.3) الشكل (2-20) أن المقاومة النوعية تقل عند التشويب وعند التلدين بدرجة حرارة Cd 300. كذلك ندحظ من الشكل (2-20) أن المقاومة النوعية تقل عند التشويب وعند التلدين بدرجة حرارة Cd 300. كذلك تم حساب (20-20) أن المقاومة النوعية تقل عند التشويب وعند التلدين بدرجة حرارة Cd 300. كذلك تم حساب (2-20) أن المقاومة النوعية تقل عند التشويب وعند التلدين بدرجة حرارة Cd 300. كذلك تم حساب التوصيلية (0) من خلال المعادلة (2-20) والشكل (4-31) يوضح التوصيلية كدالة لدرجة الحرارة لمدى المدى كرارة Cd 300. لامدى كرارة Cd 300. كذلك تم حساب المدى كرركة المدى كرركة المدى كرركة المنيوم قبل وبعد التادين حيث نلاحظ لمدى كرركة التوصيلية بزيادة درجة الحرارة وكذلك تزداد عند التشويب بالليثيوم والالمنيوم والمنيوم ويخرى ذلك الى زيادة حاملات الشحنة عند التشويب [13] .





شكل (β-30) المقاومية (ρ) لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين.





شكل (β-31) التوصيلية (σ) لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين .

(2-4-4) طاقة التنشيط

Activation energy

من خلال المعادلة (2-28) تم حساب طاقة التنشيط كما في الشكل (4-32) من خلال ميل العلاقة البيانية التي ترسم بين (Inσ) ومقلوب درجة الحرارة (1/T) مضروبا بثابت بولتزمان (β) بوحدة (eV) ، ويبين الشكل (4-32) العلاقة بين التوصيلية (Inσ) و مقلوب درجات الحرارة لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم بنسبة (7.5%) قبل وبعد التلدين ، أظهرت التوصيلية وجود طاقتي تتشيط لجميع الاغشية المقاسة كما موضحة في الجدول (4-6) وهذا يتفق مع النتائج التي وجدت عند قياسات XRD فان تغير كثافة العيوب مع تغير درجات الحرارة تؤدي الى تغير طاقة التنشيط مع والتي تكون عندها طاقة التنشيط (Ea1) وآلية التوصيل الأولى في منطقة الدرجات الحرارة العالية والتي تكون عندها طاقة التشيط (Ea1) وآلية التوصيل الأولى في منطقة الدرجات الحرارة العالية المتهيجة بين حزم الممتدة للطاقة ، والثانية في منطقة درجات الحرارة الأولى التوصيل بوساطة حاملات الشحنة المتهيجة بين حزم الممتدة للطاقة ، والثانية في منطقة درجات الحرارة التوصيل بوساطة حاملات الشحنة عن التنظط لحاملات الشحنة بين المستويات الموضعية قرب مستوى فيرمي . نلاحظ أن أعلى طاقة تنشيط عند أعشية حلال القدية والغير ملدنة كافية العيوات الموضعية قرب مستوى فيرمي . نلاحظ أن أعلى طاقة تشيط

```
الغصل الرابع
```

```
النتائج والمناقشة
```

او الليثيوم ويمكن ان يعزى ذلك الى زيادة تركيز حاملات الشحنة عند التشويب يؤدي الى زيادة التوصيلية وبالتالي يؤدي الى نقصان Ea .







شكل (4-32) طاقتي التنشيط لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين.

جدول (4-6)قيم طاقتي التنشيط لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين.

activation	CdS	CdS	CdS:7.5%Li	CdS:7.5%Li	CdS:7.5%Al	CdS:7.5%Al
energy		(ann)		(ann)		(ann)
Eal(eV)	0.9601	0.2938	0.9528	0.4973	0.8687	0.8509
Ea2(eV)	0.1734	0.0732	0.0615	0.0556	0.1615	0.0743

الغصل الرابع

Hall effect

(4-4-3) تأثير هول

أظهرت نتائج قياسات تأثير هول (Hall effect) لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم بنسبة (7.5%) قبل وبعد التلدين والمقاسة بدرجة حرارة الغرفة أن جميع الاغشية تمتلك توصيلية من نوع (n-type) وذلك من خلال ملاحظة اشارة معامل هول لا تتغير بالتشويب او التلدين، والنتائج المبينة في الجدول (2-4) توضح أن تركيز حاملات الشحنة (الالكترونات) يزداد عند التشويب بالليثيوم او الالمنيوم وكذلك عند التلدين، تحركية حاملات الشحنة تقل عند التشويب وتزداد عند التلدين [43,92]. المقاومية تقل عند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وكذلك تقل عند التشويب ويقابلها زيادة في التوصيلية عند التشويب وبعد التلدين .

جدول (7-4) نتائج قياسات هول لأغشية CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم قبل وبعد التلدين.

sample	Conductivity $(\Omega. \ cm)^{-1}$	Average Hall coefficient (cm ³ /c)	Resistivity (Ω. cm)	Mobility (cm ² /Vs)	Carriers concentratio n (cm-3)
CdS	9.09×10 ⁻⁷	-5.10×10 ⁸	1.09×10 ⁶	4.64×10 ²	-1.22×10 ¹⁰
CdS (ann)	5.87×10 ⁻⁶	-2.07×10 ⁸	1.71×10 ⁵	1.21×10 ³	-3.02×10 ¹⁰
CdS:7.5%Li	2.27×0 ⁻⁶	-1.88×10 ⁷	4.41×10 ⁵	0.42×10 ²	-3.31×10 ¹¹
CdS:7.5%Li (ann)	5.06×10 ⁻⁶	-1.77×10 ⁸	1.98×10 ⁵	8.94×10 ²	-3.53×10 ¹⁰
CdS:7.5%Al	3.99×10 ⁻⁶	-7.61×10 ⁷	2.51×10 ⁵	3.03×10 ²	-8.21×10 ¹⁰
CdS:7.5%Al (ann)	6.15×10 ⁻⁶	-2.62×10 ⁵	1.63×10 ⁵	1.62×10 ³	-2.37×10 ¹⁰
Conclusions

(4-5) الاستنتاجات

- عند دراسة حيود الاشعة السينية وجد أن اغشية كبريتيد الكادميوم النقية و المشوبة بالليثيوم
 بالألمنيوم بنسب (% 7.5 , 7.5) جميعها متعددة التبلور من النوع المكعب وذات اتجاه
 مفضل للنمو هو (111) قبل وبعد التلدين وذات حجم بلوري نانوي تقع ضمن المدى 5.87)
 nm (15.79 لجميع الاغشية المحضرة .
- عند دراسة السطح طبوغرافيا (AFM) وجد أن خشونة السطح ومتوسط الجذر التربيعي تزداد ضمن المدى (AFM nm) و (متوسط الجذر التربيعي تزداد ضمن المدى (nm 0.87-2.8) و (3.37-11.4 nm) و الليثيوم وكذلك تزداد بعد التلدين لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية والمشوبة بالليثيوم وتقل بعد التلدين لأغشية كبريتيد الكادميوم .
 - عند در اسة مور فولوجيا السطح بجهاز (SEM) وجد أن الاغشية ذات تجانس وتوزيع منتظم .
- * من خلال طيف النفاذية والامتصاصية وجد ان النفاذية تزداد بزيادة الطول الموجي وتقل قيمتها بريادة السمك وعند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وتزداد قيمتها بعد التلدين لجميع الاغشية ، وان الامتصاصية تقل بزيادة الطول الموجي وتزداد بزيادة السمك وعند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وتزداد فيمتها بعد التلدين لجميع الاغشية ، وان المتصاصية تقل بزيادة الطول الموجي وتزداد بزيادة السمك وعند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وتزداد بزيادة السمك وعند التشويب بالليثيوم والالمنيوم والالمنيوم وتزداد بزيادة السمك وعند التشويب بالليثيوم والالمنيوم وتقل قيمتها بعد التلدين لجميع الاغشية ، ومن خلال طيف النفاذية يتضح أن أعظم نفاذية مستقرة في المنطقة تحت الحمراء القريبة من المنطقة المرئية ، مما يؤكد أهمية الاغشية المحضرة في التطبيقات الألكتروبصرية .
- ♦ تمتلك الاغشية معامل امتصاص عالي (α>10⁴ cm⁻¹) وهذا يعني حدوث انتقالات الكترونية مباشرة مسموحة .
- وجد ان فجوة الطاقة تقل بزيادة السمك وزيادة نسب التشويب بالليثيوم والالمنيوم وتزداد فجوة الطاقة بعد التلدين لجميع الاغشية ، وتكون فجوة الطاقة تقع ضمن المدى eV (3 2.72) و هي اكبر من فجوة الطاقة للمواد الكتلوية (Bulk) وذلك بسبب الحصر الكمي للأغشية نانوية التبلور (D <10 nm)</p>
- من خلال الفحوصات الكهربائية وحساب التوصيلية الكهربائية المستمرة وجد أن هناك قيمتي لطاقة التنشيط وهذا يعني وجود ميكانيكيتين للانتقال احدهما في درجات الحرارة الواطئة والاخرى في درجات الحرارة العالية .
- عند اجراء قياسات هول وجد أن اغشية كبريتيد الكادميوم النقية والمشوبة بالالمنيوم والليثيوم قبل
 وبعد التلدين من النوع السالب (n-type) مما يتيح استخدامها في الدوائر الالكترونية

النتائج والمناقشة

الغصل الرابع

Future Works

(6-4) المشاريع المستقبلية

- دراسة تأثير تشويب الليثيوم والالمنيوم لأغشية كبريتيد الكادميوم على الخصائص التحسسية لغاز NH₃ .
- دراسة تأثير التركيز المولاري لمصدر الكادميوم على الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية كبريتيد الكادميوم بطريقة الرش الكيميائي .
- تأثير تغير الرقم الهيدروجيني pH على الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية كبريتيد الكادميوم النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم المحضرة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي .
- دراسة الخصائص التركيبية والكهربائية لاغشية كبريتيد الكادميوم النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم المرسبة على ارضيات مختلفة بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي .
- تصميم خلية شمسية من اغشية كبريتيد الكادميوم CdS النقية والمشوبة بالليثيوم والالمنيوم بطريقة الترذيذ الماكنتروني .



المصادر

References

المصادر

[1] اس.ام.زي " نبائط اشباه الموصلات فيزياء وتقنية"، ترجمة د. فهد غالب د حسين علي احمد ،جامعة الموصل ،(1990) .

[2] K. L. Chopra, "Thin film phenomena", Mc. Graw-Hill book company, New York, 1969.

[3] M. Ohring , "The Materials Science of Thin Films" , Academic Press, (1992).

[4] L. Eckertova, "Physics of Thin Films", Plenum presses, New York and London (1977).

[5] G. Hodes, "Chemical Solution Deposition of Semiconductor Films", Marcel Dekker (2003).

[6] A. S. Grove, "Physics and Technology of Semiconductors Devices", University of California, Berkeley, (1967).

[7] S. M. Sze, "Semiconductor Devices Physics and Technology", (1990).Printce- Hall of India Private Limited (1985).

[8] J. C. Philips, "Bonds and Bands in Semiconductors", Academic Press, New York & London, (1973).

[9] B. G. Streetman, "Solid State Electronic Devices", University of Texas At Austin, Dep. Of Electrical & Computer Engineering, Printce. Hall of India, New Delhi, (1997).

[10] V. A. Bruk, V. V. Garshenin & A. I. K. Wroov, "Semiconductor Technology", Translated from Russia by A.Ulaynove, Mir Pullishers, Moscow, (1969).

[11] J. S. Blakmore, "Solid State Physics", 2nd ed., W. B. Saunders Company, U.S.A, (1974).

[12] B. Sapoval and C. Hermann, "Physics of Semiconductors", Springer.Verlag, New York ,Inc (1995).

[13] R. B. Alder, A. C. Smith, R. L. Langini, "Introduction to Semiconductors Physics", John Wiley & Sons, Inc., New York, London (1964).

[14] M. G. Yousif, "Solid State Physics", Vol.2, Baghdad University,(1989), (Arabic Version).

[15] K. A. A. Adem ,"Study of The Some Physical Properties of Hg_{1-X} Cd_XTe Compound", M. Sc. Thesis, University of Baghdad, (2002).

[16] A. G. Milnes & D. L. Feucht, "Hetrojunction and Metal Semiconductor Junctions", Academic Press, New York & London, (1972).

[17] B. L. Sharma and R. K. Purohit, "Semiconductor Hetrojunction", Pergamon Press, (1974).

[18] S. M. Sze, "Semiconductors Devices", John Wiley and Sons, Ins, (2002).
 [19] صبحي سعيد الراوي ، " فيزياء الالكترونيات "، مطبعة جامعة الموصل، (1987).

[20] Hani M. Khallaf, chemical bath deposition of group ii-vi semiconductor thin films for solar cells applications, M.Sc.thesis University of Central Florida, 2005.

[21] K.L. Chopra and I. Kaur, "Thin film device applications", Plenum Press, New York, 1983.

[22] L.R.D.Gutierrez ,J.J.C.Romero, and M.O.Lopez, Materials Letters , Vol.60, pp. 3866-3870, 2006.

[23] D.D.O.Eya,A.J.Ekpunobi, and C.E.Okeke, The pacific J. of Science and Technology, Vol. 6(2), pp98-104 ,2005.

[24] S.M.H.AL-Jawad,"Study of Some Physical Properties of CdS Films Prepared by Chemical Bath Deposition, PhD. thesis "Applied Science Dep, University of Technology, 2006.

[25] K. Ng Kwok, "Complete Guide to Semiconductor Devices", McGraw-Hill, U.S.A. (1995).

[26] L. Eckertova, "Physics of Thin Films", Plenum press, New York and London, (1977).

[27] L. Floyd Thomas, "Electronic Devices", 5th ed., NewJersey, (1999).

[28] B. Kahdum, "Effect of Li,Al doping on the Structural and some Optical studies of CdS thin films fabricated by Sol–Gel Technique" M.Sc. Thesis, University of Babylon, 2017.

[29] P.G. Sheasby and R. Pinner, "The Surface Treatment and Finishing of Aluminum and Its Alloys", 6th Edition, ASM International (2001).

[30] Y. A. Bagaryatskiy, "The Chromium Corner of the Cr-Ni-Al System and the Cr-Ni-Al Pseudo binary Section", Zh. Neorg. Khim., 1958, Vol. 3(3), pp. 722-728, in Russian; TR: Russ. J. Inorg. Chem., Vol. 3(3), pp. 247-252,1958.

[31] Jae-Hyeong Lee, Jun-Sin Yi, Kea-Joon Yang, Joon-Hoon Park, Ryum-Duk Oh, "Electrical and optical properties of boron doped CdS thin films prepared by chemical bath deposition", Thin Solid Films Vol.431 pp. 344– 348,(2003).

[32] Jae-Hyeong Lee, "Influence of substrates on the structural and optical properties of chemically deposited CdS films", Thin Solid Films Vol. 515 pp. 6089–6093,2007 .

[33] F. Yakuphanoglu , C. Vİswanathan , P. Peranantham , D. Soundarrajan ,"Effects of the film thickness on optical constants of transparent CdS thin films deposited by chemical bath deposition" Journal OF Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 11, pp. 945 – 949, 2009 .

[34] Bharat N. Patila, D. B. Naikb and V. S. Shrivastava, "Synthesis and characterization of Al doped CdS thin films grown by chemical bath deposition method and its application to remove dye by photocatalytic treatment", Chalcogenide Letters, Vol. 8, pp. 117 – 121,2011.

[35] A. Hasnat , J. Podder ," Dielectric properties of spray pyrolized Aluminum doped Cadmium sulfide (Al-doped CdS) thin films", Physical Sciences Vol. 7(47), pp.6158-6161,2012 .

[36] R. Panda, V. Rathore, M. Rathore, V. Shelke, N. Badera, L.S. Sharath, D. Jain, M. Gangrade, T. Shripati and V. Ganesan, "Carrier recombination in Cu doped CdS thin films: photocurrent and optical studies", Applied Surface Science, Vol. 258 pp. 5086–5093,(2012).

[37] U. Sandoval , M. E. Hernández Torres ,J. M. Garcia Jimenez , N. R. Silva González, "Optical and Structural Characterization of Li-doped CdS Nanoparticles" Mater. Res. Soc. Vol. 1509 , 2013.

[38] Munirah, Mohd. Shahid Khan, Anver Aziz, Saadah Abdul Rahman, Ziaul Raza Khan, 'Spectroscopic studies of sol-gel grown CdS nanocrystalline thin films for optoelectronic devices", Materials Science in Semiconductor Processing Vol. 16 pp. 1894–1898,(2013).

[39] M. Muthusamy, S. Muthukumaran , M. Ashokkumar, "Composition dependent optical, structural and photoluminescence behavior of CdS:Al thin films by chemical bath deposition method", Ceramics International Vol. 40 pp. 10657–10666 ,2014.

[40] H L Pushpalatha,S. Bellappa , T. N. Narayanaswamy and R. Ganesha, "Structural and optical properties of CdS thin film obtained by chemical bath deposition and effect of annealing", Indian Journal of Pure & Applied Physics Vol. 52, pp. 545-549, 2014 .

92

[41] F. Hashim , B. Kahdum, "Effect of Li doping on the Structural and some Optical studies of CdS thin films fabricated by Sol–Gel Technique", International Journal of Research in Applied, Vol. 4, pp. 155-164, 2016.

[42] Z. Makhdoumi-Kakhaki, A. Youzbashi1, P. Sangpour, N. Naderi, A.Kazemzadeh, "Effects of film thickness and stoichiometric on the electrical optical and photodetector properties of CdS quantum dots thin films deposited by chemically bath deposition method at different bath temperature", J Mater Sci: Mater Electron, (2016).

[43] Bijumon C. C., V. SEnthil Kumar, "Raman, PL and Hall effect studies of CdS thin film deposited by Chemical bath deposition", nternational Journal of Physics and Research, Vol. 6, pp. 31-36, 2016.

[44] Ligang Ma , Xiaoqian Ai and Xiaoshan Wu," Effect of substrate and Zn doping on the structural, optical and electrical properties of CdS thin films prepared by CBD method" , Journal of Alloys and Compounds Vol. 691 pp. 399-406,2017 .

[45] Muhammad A. H., Mohammad M., Shin Woei Leow, Li WenJie, Rajiv Ramanujam P., and Lydia H. W., "Investigation of selenization and various CBD CdS deposition conditions to fabricate high performing spray pyrolysis synthesized Cu(In,Ga)(S,Se)2 solar cells" Journal of Renewable and Sustainable Energy Vol.9, 013504 (2017).

[46] B.En.G. Streetman, "Solid State Electronic Devices"2ndEdition, Prentice Hall ,.Inc, Englewood Cliffs ,N.J.(1980).
[47] M. H. Brodsky," Amorphous Semiconductors", 2nd ed. Springer Verlag, Germany,(1979).

[48] M.J. Seong, O.I. Micic, A.J. Nozik, and A. Mascarenhas, Applied Physics Letters, Vol.82 (2), pp. 185 – 187, 2003.

93

[49] D. Matsuura, Y. Kanemitsu, T. Kushida, C.W. White, J.D. Budai, and A. Maldrum, Applied Physics Letters, Vol.77 (15), pp. 2289 – 2291, 2000.

[50] B.K. Patel, K.K. Nanda, and S.N. Sahu, J. Appl. Phys., Vol.85, pp.3666– 3670, 1999.

[51] W. Liu, C. Jin, C. Jia, L. Yao, W. Cai, and X. Li, Chemistry Letters, Vol.33, pp.228 – 229, 2004.

[52] L.E. Brus, J. Chem. Phys., Vol.79, pp.5566 – 5571, 1983.

[53] S. Jindal,"Optical and structural properties of Tb doped CdS nanoparticles ", M.Sc. thesis , Thapar University, Patiala Vol.147 004, 2015 .

[54] V. Singh, P. K. Sharma and P. Chauhan, "Materials Characterization ", Vol.62, pp. 43-52, 2011.

[55] Groeneveld E. ,"Synthesis and optical spectroscopy of (hetero)nanocrystals".,PhD. Thesis, Utrecht University, Utrecht (2012).

[56] Y. N. Al-Jammal, "*Solid State Physics*", Al-Mousal University Press, Arabic Version, (1990).

[57] محمد امين سليمان، احمد فؤاد باشا وشريف احمد خيري، *افيزياء الجوامد*"،مطبعة الفكر العربي (2000).

[58] W. D. Callister, "*Materials Science and Engineering*", 4th ed., John Wiley and Sons, (2007).

[59] B. E. Warren, "X-RAY diffraction" Published by Courier Dover, (1990).

[60] يحيى نوري الجمال ، "فيزياء الحالة الصلبة " جامعة الموصل ، المكتبة الوطنية (2000) .

[61] F. K. Emmett, "*Hand Book of X-rays*", McGraw-Hill, New York, (1967).

[62] عبدالفتاح الشاذلي،" فيزياء الجوامد" الطبعة الاولى ، الدار العربية للنشر والتوزيع، مدينة النصر (2003) .

[63] Santhosh K. N, Govinda D2 and Thirumala R. G., *Synthesis, Structural and Morphological Studies of CdS Nanopowder*, International Journal of chemical sciences, Vol.15,Iss1, 2017.

[64] S.J.B.Reed," *Electron Microprobe Analysis And Scanning Electron Microscopy In Geology*,", Cambridge University Press, New York, (2005).

[65] A. V. Clemente, K. Gloystein," *Principles of atomic force microscopy* ", Physics of Advanced Materials Winter School, (2008).

[66] S. K. J. Al- Ani, "Studies of optical and related properties of thin amorphous films", Ph.D. Thesis, Brunel University, (1984).

[67] J. Taunce ,"*Amorphous and Liquid Semiconductors*", Plenum Press, London, (1974).

[68] C.kittel,"Introduction to Solid State Physics",6th .Edition ,Wiley ,(1986) .

[69] S. Ben, "Solid State Electronic Devices", Hall International, Inc.,U.S.A, (1990).

[70] O. Stenz, "*The Physics of Thin Film Optical Spectra*", An Introduction, Winzerlaer Str. 10, 07745 Jena, Germany, (2005).

[72] عادل حبيب عمر ان ،" در اسة الخواص البصرية والكهربائية لأغشية (CuO,CdO) ومزيجهما بطريقة الرش الكيميائي الحراري" رسالة ماجستير ،جامعة بابل،(1998).

[73]B. L. Theraja, "Modern Physics", S. Chandand Company (PVY), New Delhi, (1987).

[74] Ekbal A. M., "Study of the Physical Properties of ZrO2 :(Co,Ti) Thin Films Prepared by Chemical Spray Pyrolysis", M.Sc. Thesis, Al- Qadisiya University,(2016)

[75] M.Fox, "Optical Properties Of Solide", Oxford University Press Inc, NewYork,(2001).

[76] Sura N. T., "Study The Structural, optical and electrical properties of Indium doped Tin oxide thin films deposited by thermal evaporation", M.Sc. Thesis, kufa University,(2017).

[77] Reitz, Frederic J. Milford, Robert W. Christy."Foundations of electromagnetic theory", 4th ed. San Francisco, Calif. , 2009.

[78] R. K. Al-Hakim and A. Kh-Knidaira, "Fundamentals of electric engineering", Ministry of higher education and scientific research press, (1980).

[79] N.F. Mott and E.A. Davis, "Electronic processes in non-crystalline materials", 2nd ed., Oxford University Press, New York, 1971.

[80] M. H. Brodsky, Topics in Applied Physics, "Amorphous semiconductors", 2nd ed. Springer-Verlag, 1979.

[81] Emin D., Polycrystalline and amorphous thin films and devices , Kazmeraski press, New York, 1980.

[82] مؤيد جبر ائيل يوسف ، فيزياء الحالة الصلبة ، الجزء الثاني ، جامعة بغداد ، 1989 .

[83] Yepifanov G.I., and Moma Y.A., Introduction to solid state Electronics, Mir publishers, Moscow, 1984.

[84] نوال فتاح ناجي ، " در اسة تأثير ابعاد الحبيبات على الخواص الكهر بائية للنحاس" ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، (1997) . [85] Nedhal Ali Hussein, "Study The Influence of Thickness and Difference Temperature on The Electrical Photo Electronic Properties for ZnSe Thin Films", M.Sc. Thesis, Baghdad University,(2002).

[86] جي أي د.، "الكيمياء اللاعضوية العامة"، ترجمة د. حبيب عبد الاحد، مطبعة الموصل (1986).

[87] S. Mageswari , L. Dhivya , Balan Palanivel , Ramaswamy M. , "Structural, morphological and optical properties of Na and K dual doped CdS thin film", Journal of Alloys and Compounds Vol. 545 pp. 41–45 ,2012 .

[88] A. Mukherjee, P. Ghosh, A.A. Aboud, P. Mitra, "Influence of copper incorporation in CdS: Structural and morphological studies", Materials Chemistry and Physics Vol.184 pp. 101-109,2016.

[89] N. Kavitha, R. Chandramohan, S. Valanarasu, T. A. Vijayan, S. Rex Rosario, A. Kathalingam, "Effect of film thickness on the solar cell performance of CBD grown CdS/PbS heterostructure", Materials Science Materials in Electronics, (2015).

[90] A.M. Perez Gonzalez, I. Valeriano Arreola, "Structural, optical and electrical properties of CdS thin films obtained by spray pyrolysis", Revista Mexicana Defisica, Vol.54 (2) pp. 112–117,2008.

[92] A. jafari , Z. Rizwan, M. S. Mohd Ghazali, F. Uddin, A. zakaria , Optical and Structural Characterization of air-anneale CdS film prepared by chemical bath deposition (CBD) Technique, Chalcogenide Letters, Vol. 7, No. 12, pp 641-646, 2010 .

[92] A. Hasnat , J. Podder, "Structural and Electrical Transport Properties of CdS and Al-doped CdS Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis", J. Sci. Res. Vol.4 (1), pp. 11-19 2012 .

[93] Al-Salman, Husam, S., "Optical and Structure properties of heavily Aldoped CdS Films", Basrah Journal of Scienec (A), Vol.28 ,pp23-38, 2010.

[94] L.S. Ravangave ,S.D. Misal, U.V. Biradar, K.N. Rothod, "Comparative Study of Structural, Morphological And Optical Characterization of CdS, CdAlS and CdAlS Annealed Thin Films"Materials Physics and Mechanics Vol.14 pp.129-136 ,2012 .

[95] S. A. Zahra," studied Effect of grain size on the electrical conduction mechanism for aluminum doped CdS thin films ", Journal of Electron Devices, Vol. 17, pp. 1494-1499, 2013.

[96] Al-Ubady A. Abdul Hussain, "A Study of the Influence of the Substrate Temperature and Doping with Copper on the Some Structural and Optical Properties of Nanocrystalline Cadmium sulfide Films", M.sc Thesis, Al-Mustansiriyah University, 2012.

[97] H. Khallaf, G. Chai, O. Lupan, L. Chowa, S. Park and A. Schulte, "Characterization of gallium-doping CdS thin films grown by chemical bath deposition", Applied Surface Science, Vol.255 pp.4129-4134 ,2009 .

[98] Jaehyeong L., "Raman scattering and photoluminescence analysis of Bdoped CdS thin films", Thin Solid Films, Vol. 451 pp.170–174 ,2004.

[99] L. I. Soliman, H.H. Afify, I.K. Battisha, "Growth impedence of pure CdS films", Indian J. of Pure and Applied Phys., Vol.42 ,pp.12-17, 2004.

[100] Al-Jumaili S. Hamid., Taha N. Mahmood "Stractural and optical properties of CdS:In nanoparticals thin films prepared by CBD technique" (IJAIEM) Vol. 2, pp. 60-65, 2013.

[101] J. Nicholas Alexander, Seiichiro Higashiya, Douglas Caskey Jr, Harry Efstathiadis, Pradeep Haldar," Deposition and characterization of cadmium

sulfide (CdS) by chemical bath deposition using an alternative chemistry cadmium precursor", Solar Energy Materials & Solar Cells Vol.125 pp.47–53,2014.

[102] Ezenwa I. A., "Effect of Film Thickness on the Transmittance of Chemical Bath Fabricated CdS Thin Film", Advances in Applied Science Research, Vol.3 (5)pp.2826-2829, 2012.

[103] N.A. Shah,R.R. Sagar, W. Mahmood, W.A.A. Syed, "Cu-doping effects on the physical properties of cadmium sulfide thin films", J. of Alloys and Compounds, Vol.512 pp.185–189, 2012.

[104] M.A ,Olopade, A.M, Awobode, Awe, O.E , Imalerio, T.I,IJRRAS ,Vol.15,pp.120-124, 2013 .

[105] A. Mukherjee, P. Ghosh, A.A. Aboud, P. Mitra, "nfluence of copper incorporation in CdS: Structural and morphological studies" Materials Chemistry and Physics Vol.184, pp101-109,2016.

[106] Y. Al-Douri, Q. Khasawneh, S. Kiwan , U. Hashim, S.B. Abd Hamid, A. H. Reshak, A. Bouhemadou, M. Ameri and R. Khenata, "Structural and optical insights to enhance solar cell performance of CdS nanostructures ", Energy Conversion and Management, Vol. 82, pp. 238-243, (2014).

[107] B. Ray, "II-VI Compound",1st ed., Printed in Greet Brititain by Neili and Co, Ltd., of Edinburgh, (1969).

[108] H. R. A. AL-Dawodi, " A study of the structural and optical properties of obliquely deposited (CdS) thin films ", College of Science, physics department, PhD thesis, Al- Mustansiriyah University, (2010).

[109] Ali M. Mousa, Adawiya J. Haider and Selma M.Hassan Al-Jawad, "Optical Properties of Nanostructure in CdS at Different Condition Bath Deposition", Journal of Materials Science and Engineering Vol.5 pp.184-491,2011.

[110] Nada K. Abbas , Lamia K. Abbas and Suaad A-Muhameed, "Effect Of Thickness On Structural And Optical Properties Of ZnxCd1-xS Thin Films Prepared By Chemical Spray Pyrolysis" , Int. J. Thin Film Sci. Tec. Vol.2 pp.127-132 ,2013 .

[112] Ruby Das, Suman Pandey, "Comparison of Optical Properties of Bulk and Nano Crystalline Thin Films of CdS Using Different", International Journal of Material Science, Vol.1, PP.35-40, 2011.

[112] R. Mariappan , V. Ponnuswamy , M. Ragavendar , D. Krishnamoorthi ,
C. Sankar , "The effect of annealing temperature on structural and optical properties of undoped and Cu doped CdS thin films" Optik Vol.123 pp.1098–1102 ,2012 .

[113] K.K. Nanda, S.N. Sarangi, S. Mohanty, and S.N. Sahu, Thin Solid Films, Vol.322, pp 21 – 27, 1998.

[114] N.N. Parvathy, G. is attributed to presence M.Pajonk, A.V.Rao. J. Mater. Synth. Proc. Vol.7, 221 ,1999 .

[115] Haider A. Abdulwahid," Fabrication and Characterization of

Nanostructures CdS-Dye Sensitized Solar Cells", M.Sc. Thesis, University of Basrah,(2016).



In this research studied the structure , optical and electrical properties of thin films of pure cadmium sulfide (CdS) with thickness (150,300, 450) nm and Li, Al- doped CdS with different percentages of (2.5, 5, 7.5%) with thickness (450nm). thin films were prepared by using chemical bath deposition method on glass slides substrate at ($75\pm3^{\circ}C$) bath temperature and the desired pH value 9.5 was achieved by the addition of aqueous ammonia solution proportionally into the mixture in the chemical bath . The films were annealed in air at constant temperature 300°C and constant time (60) min.

The structural properties of the films were studied by X-ray analysis revealed that all deposited films are found to be polycrystalline with a cubic structure with a preferred orientation along the (111) plane , the crystallite size calculated that all deposited films are found to be increase with increase (thickness , Al and Li doping percentage) as increase at annealing . Dislocation density, Number of grains and Micro strain values are decreasing with the increasing of (thickness ,Al and Li doping percentage) as decrease with annealing . Using scanning electron microscope (SEM) and found that the films have dense and homogeneous distribution and uniform . The surface morphology of thin films is studied by using atomic force microscope (AFM), the root mean square and surface roughness values are increasing with (Al and Li dopant), It also increases with annealing of pure CdS and Li- doped CdS while decreasing with annealing of Al- doped CdS .

The optical properties of all deposited CdS films contained study of transmittance and absorbance spectral in the range of wave length (300-1100)nm by using UV- Visible . Transmittance decreased with increasing (thickness ,Al and Li doping percentage) of CdS thin films . While the transmittance increased after annealing . The fundamental absorption edge of CdS thin films shifted towards the lowest photon energies with increasing

(thickness , Al and Li doped CdS) and shifted toward the highest photon energies after annealing . From the absorption coefficient values which calculated from the absorbance spectrum which is larger than (10^4 cm⁻¹) gives an indicate that all (CdS) films were direct semiconductors and the electronic transition was a direct transition. Also The optical constant calculated reflectance (R),extinction coefficient (K) and refractive index (n) . Nanocrystalline pure CdS and Li, Al-doped CdS have been deposited the band gap changes from (2.72 - 3) eV as compared to the bulk CdS band gap of 2.42 eV as a result of quantum confinement .

The electrical properties of pure CdS and (Li, Al- doped CdS) films were indicated to the effect of temperature on the resistance of the films within range (303- 473) $^{\circ}$ K . Calculation of electrical conductance and activation energies showed that there are two activation energy and these mean that there are two mechanisms of conductive. And the results of Hall effect showed that the type of films are n-type .

Republic of Iraq Ministry of Higher Education and Scientific Research University of Qadisiyah College of Education Physics Department



Study the structural, optical and electrical properties of pure and(Lithium , Aluminum) doped Cadmium Sulfide CdS thin films prepared by chemical bath method .

A thesis

Submitted to the council of the college of Education Qadisiyah University in partial fulfillment of the requirements for the degree of M.Sc. in physics science

> By **Dakhil Abbas Abedzaid**

> > Supervised by

Asst. Prof. Dr **Hussein Ali Noor**

2017 A.D

1439 H.D